日本 国特 許 庁 JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年10月22日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-323744

出 願 人 Applicant(s):

株式会社村田製作所

2001年11月 9日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】 特許願

【整理番号】 1121073

【提出日】 平成13年10月22日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B63B 11/00

【発明者】

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田

製作所内

【発明者】

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田

製作所内

【氏名】 髙橋 繁已

【発明者】

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田

製作所内

【氏名】 桧垣 忠則

【発明者】

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田

製作所内

【氏名】 織田 善夫

【発明者】

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田

製作所内

【氏名】 崔 弘毅

【発明者】

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田

製作所内

【氏名】 竹内 茂之

【特許出願人】

【識別番号】 000006231

【氏名又は名称】 株式会社村田製作所

【代表者】

村田 泰隆

【代理人】

【識別番号】 100087619

【弁理士】

【氏名又は名称】 下市 努

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

特願2000-367970

【出願日】

平成12年12月 4日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 028543

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9004883

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 粉末成形装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 粉末成形空間を有するダイスと上,下パンチユニットとからなる金型と、上記上,下パンチユニットをそれぞれ独立して駆動することにより加圧成形を行なう加圧駆動機構とを備えた粉末成形装置において、上記加圧成形された成形体を上記ダイスから離型させた状態で所定位置に保持する成形体保持手段を設けたことを特徴とする粉末成形装置。

【請求項2】 請求項1において、上記成形体保持手段は、上記上,下パンチュニットの何れかを上記成形体に係合させることにより保持するように構成されていることを特徴とする粉末成形装置。

【請求項3】 請求項1又は2において、上記成形体保持手段は、上記ダイスに配設された係合片を上記成形体に係合させることにより保持するように構成されていることを特徴とする粉末成形装置。

【請求項4】 請求項1ないし3の何れかにおいて、上記成形体保持手段は、上記成形体の少なくとも一部を囲むように形成されたガイド部材を上記成形体に係合させることにより保持するように構成されていることを特徴とする粉末成形装置。

【請求項5】 請求項1ないし4の何れかにおいて、上記成形体保持手段は、押圧機構により上記成形体を押圧保持するように構成されていることを特徴とする粉末成形装置。

【請求項6】 請求項1ないし5の何れかにおいて、上記成形体保持手段は、流体圧力発生機構による流体圧と大気圧との圧力差により上記成形体を保持するように構成されていることを特徴とする粉末成形装置。

【請求項7】 粉末成形空間を有するダイスと上,下パンチユニットとからなる金型と、上記上,下パンチユニットをそれぞれ独立して駆動することにより加圧成形を行なう加圧駆動機構とを備えた粉末成形装置において、上記上,下パンチユニットをダイスに位置決めするパンチ位置決め手段を設けたことを特徴とする粉末成形装置。

【請求項8】 請求項7において、上記パンチ位置決め手段は、上記上,下パンチュニットの少なくとも一方に装着されたテーパブロックと、上記ダイスに形成されたテーパ部とからなり、該テーパ部に上記テーパブロックをテーパ嵌合させることにより位置決めするように構成されていることを特徴とする粉末成形装置。

【請求項9】 請求項8において、上記テーパブロックは、上,下パンチユニットとは独立して駆動されるように構成されていることを特徴とする粉末成形装置。

【請求項10】 請求項7において、上記パンチ位置決め手段は、上記ダイスに形成された位置決め孔と、上記上、下パンチユニットの少なくとも一方に形成され尖部を有するガイドピンとからなり、該尖部を上記位置決め孔に係合させることにより位置決めするように構成されていることを特徴とする粉末成形装置

【請求項11】 請求項8又は9において、上記ダイス又はテーパブロックに粉末成形空間内の空気を吸引することにより減圧する減圧手段が配設されていることを特徴とする粉末成形装置。

【請求項12】 請求項11において、上記減圧手段は、上記ダイス又はテーパブロックに上記粉末成形空間に連通するように形成された減圧通路と、該減圧通路に接続された真空発生源とから構成されていることを特徴とする粉末成形装置。

【請求項13】 請求項11において、上記テーパブロックは、上記ダイスの粉末成形空間及びその周囲を気密に囲むように形成されており、該テーパブロックに上記減圧通路が形成されていることを特徴とする粉末成形装置。

【請求項14】 請求項11ないし13の何れかにおいて、上記減圧手段は、上記粉末成形空間に粉末を供給するときに減圧を開始し、該減圧状態を少なくとも加圧成形を行なうときまで維持するように構成されていることを特徴とする粉末成形装置。

【請求項15】 粉末成形空間を有するダイスと上,下パンチユニットとからなる金型と、該金型を少なくとも粉末供給ステージ,加圧成形ステージ,成形

体取り出しステージの間で搬送する金型搬送機構と、上記加圧成形ステージにて上記上、下パンチユニットをそれぞれ独立して駆動することにより加圧成形を行なう加圧駆動機構とを備えた粉末成形装置において、上記上、下パンチユニットの加圧移動方向と直交方向に移動させることにより上、下パンチユニットの少なくとも一方を上記加圧駆動機構に着脱可能に連結する連結手段を設けたことを特徴とする粉末成形装置。

【請求項16】 請求項15において、上記連結手段は、上記加圧駆動機構に配置固定されたクランプ本体と、該クランプ本体に上記直交方向に移動可能に支持されたスライド爪と、該スライド爪を上記パンチュニットを加圧駆動機構に連結する連結位置と、該連結を解除する非連結位置との間で駆動するスライド駆動機構とから構成されていることを特徴とする粉末成形装置。

【請求項17】 請求項16において、上記スライド爪は、上記パンチユニットにテーパ嵌合するテーパ部を備えていることを特徴とする粉末成形装置。

【請求項18】 請求項16又は17において、上記スライド駆動機構は、上記スライド爪を直線駆動するように構成されていることを特徴とする粉末成形装置。

【請求項19】 請求項16又は17において、上記スライド駆動機構は、上記スライド爪を回転駆動するように構成されていることを特徴とする粉末成形装置。

【請求項20】 粉末成形空間を有するダイスと上,下パンチユニットとからなる金型と、該金型を少なくとも粉末供給ステージ,加圧成形ステージ,成形体取り出しステージの間で搬送する金型搬送機構と、上記加圧成形ステージにて上記上,下パンチユニットをそれぞれ独立して駆動することにより加圧成形を行なう加圧駆動機構とを備えた粉末成形装置において、上記各ステージ間を搬送するときには上記下パンチユニットをダイスに保持し、上記何れかのステージに搬送したときには上記保持を解除するユニット保持手段を備えたことを特徴とする粉末成形装置。

【請求項21】 請求項20において、上記ユニット保持手段は、上記下パンチュニットを加圧方向に移動可能に支持するガイド機構と、上記下パンチュニ

ットを上記ガイド機構に固定保持する保持機構とを備えていることを特徴とする 粉末成形装置。

【請求項22】 請求項21において、上記保持機構は、上記下パンチユニットに回転軸を介して軸支された締結レバーと、該締結レバーを回転軸を中心に回動付勢することにより上記ガイド機構に面接触させて上記下パンチユニットを固定保持する付勢部材とを備えており、上記締結レバーを反付勢方向に回動させることにより上記固定保持を解除するように構成されていることを特徴とする粉末成形装置。

【請求項23】 請求項22において、上記締結レバーには、上記ガイド機構との固定力を増強させる永久磁石,あるいは電磁石が配設されていることを特徴とする粉末成形装置。

【請求項24】 請求項21において、上記保持機構は、上記下パンチユニットに回転軸を介して軸支された締結レバーと、該締結レバーを上記ガイド機構に磁力により面接触させて上記下パンチユニットを吸着保持する永久磁石と、通電することにより上記永久磁石の磁力をキャンセルして吸着力を弱める電磁石とを備えていることを特徴とする粉末成形装置。

【請求項25】 請求項21において、上記保持機構は、上記下パンチユニットに移動可能に支持されたカム部材と、該カム部材を上記ガイド機構に線接触による摩擦力でもって上記下パンチユニットを押圧固定する押圧部材とを備えており、上記カム部材を反押圧方向に移動させることにより上記押圧固定を解除するように構成されていることを特徴とする粉末成形装置。

【請求項26】 請求項25において、上記カム部材は、上記下パンチユニットに回転対偶を介して回動可能に支持された回転カムにより構成されていることを特徴とする粉末成形装置。

【請求項27】 請求項25において、上記カム部材は、上記下パンチユニットに直動対偶を介して直線移動可能に支持された直動カムにより構成されていることを特徴とする粉末成形装置。

【請求項28】 請求項20において、上記ユニット保持手段は、上記下パンチユニットを加圧方向に移動可能に支持するガイド機構と、該ガイド機構とは

独立して設けられたブレーキ部材と、該ブレーキ部材に上記下パンチユニットを 固定保持する保持機構とを備えていることを特徴とする粉末成形装置。

【請求項29】 請求項28において、上記保持機構は、上記下パンチユニットに回転軸を介して軸支された締結レバーと、該締結レバーを回転軸を中心に回動付勢することにより上記ブレーキ部材に面接触させて上記下パンチユニットを固定保持する付勢部材とを備えており、上記締結レバーを反付勢方向に回動させることにより上記固定保持を解除するように構成されていることを特徴とする粉末成形装置。

【請求項30】 請求項29において、上記締結レバーには、上記ブレーキ 部材との固定力を増強させる永久磁石,あるいは電磁石が配設されていることを 特徴とする粉末成形装置。

【請求項31】 請求項28において、上記保持機構は、上記下パンチユニットに回転軸を介して軸支された締結レバーと、該締結レバーを上記ブレーキ部材に磁力により面接触させて上記下パンチユニットを吸着保持する永久磁石と、通電することにより上記永久磁石の磁力をキャンセルして吸着力を弱める電磁石とを備えていることを特徴とする粉末成形装置。

【請求項32】 請求項28において、上記保持機構は、上記下パンチユニットに移動可能に支持されたカム部材と、該カム部材を上記ブレーキ部材に線接触による摩擦力でもって上記下パンチユニットを押圧固定する押圧部材とを備えており、上記カム部材を反押圧方向に移動させることにより上記押圧固定を解除するように構成されていることを特徴とする粉末成形装置。

【請求項33】 請求項32において、上記カム部材は、上記下パンチユニットに回転対偶を介して回動可能に支持された回転カムにより構成されていることを特徴とする粉末成形装置。

【請求項34】 請求項32において、上記カム部材は、上記下パンチユニットに直動対偶を介して直線移動可能に支持された直動カムにより構成されていることを特徴とする粉末成形装置。

【請求項35】 粉末成形空間を有するダイスと上,下パンチユニットとからなる金型と、該金型を少なくとも粉末供給ステージ,加圧成形ステージ,成形

体取り出しステージの間で搬送する金型搬送機構と、上記加圧成形ステージにて上記上、下パンチユニットをそれぞれ独立して駆動することにより加圧成形を行なう加圧駆動機構とを備えた粉末成形装置において、上記加圧成形された成形体を上記ダイスから離型させた状態で所定位置に保持する成形体保持手段と、上記上、下パンチユニットをダイスに位置決めするパンチ位置決め手段と、上記上、下パンチユニットの加圧移動方向と直交方向に移動させることにより上、下パンチユニットの少なくとも一方を上記加圧駆動機構に着脱可能に連結する連結手段と、上記各ステージ間を搬送するときには上記下パンチユニットをダイスに保持し、上記何れかのステージに搬送したときには上記保持を解除するユニット保持手段とを備えたことを特徴とする粉末成形装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、セラミックス,あるいは食品,薬品等の粉末原料をダイスと上,下 パンチユニットとからなる金型により加圧成形を行なうようにした粉末成形装置 に関する。

[0002]

【従来の技術】

この種の粉末成形装置として、例えば、特許公報第2695757号に提案されているものがある。この粉末成形装置では、複数の金型が配設された回転盤をカムフォロア及び軌道レールにより粉末供給部、圧縮成形部、製品取出部の順に搬送する構成となっている。この装置によれば、成形体の連続生産が可能となり、生産性の向上が図れる。

[0003]

また上記粉末成形装置では、金型のクランプ機構として、従来、手動,自動の何れの場合も取り付け部の遊びをなくす観点から、加圧駆動方向と同一方向に回転する回転クランプ機構を用いる場合がある。

[0004]

一方、上記金型を粉末供給部、圧縮成形部、製品取出部に順送りする場合、従

来、上下金型を同一ベース板上に固定した状態で搬送するのが一般的である。このため上下金型の位置は、送り精度等に左右されることはなく、組み付け精度の みで決めることとなる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、上述の粉末成形装置において、生産性のさらなる向上を図るには、 上記回転盤の各ステージ間の搬送速度を速めることが考えられる。しかしながら 、回転盤の回転速度を速めると、成形体に作用する慣性力等によって成形体が倒 れたり、位置ずれしたりするおそれがあり、搬送速度の高速化に対応できないと いう懸念がある。

[0006]

また上記従来の粉末成形装置では、カムフォロアと軌道レールで金型の位置を 規制する構造であるため、成形工程は上記軌道レールによって決まり、どの様な 金型を取り付けても全て同じプロファイルで動くこととなる。このため、金型を 軌道レールに合わせて設計しなければならず、成形工程の自由度が低いという問 題がある。

[0007]

上記従来の金型のクランプ機構において、加圧駆動方向とクランプ方向を同一方向とした場合には、例えば加圧後の脱型工程で成形品と金型が離型しにくい場合に、金型のクランプ部が緩み離型できなくなったり、あるいは離型時に成形品が破損したりする等の不具合が生じるおそれがある。

[0008]

さらに上記上下金型を同一ベース板上に固定した状態で搬送する構造では、上下金型を一体に搬送するという大掛かりな構造となり易い。このため、上下金型の何れか一方を搬送することが考えられるが、この場合には、送り毎に上下金型の位置決めを行なう必要があり、この点での対策が要請されている。

[0009]

本発明は、上記状況に鑑みてなされたもので、成形体を搬送する際に倒れたり , 位置ずれしたりするのを防止して搬送速度の高速化に対応できるとともに、成 形工程の自由度を向上でき、さらには離型時の破損等の問題を解消できる粉末成 形装置を提供することを目的としている。

[0010]

【課題を解決するための手段】

請求項1の発明は、粉末成形空間を有するダイスと上、下パンチユニットとからなる金型と、上記上、下パンチユニットをそれぞれ独立して駆動することにより加圧成形を行なう加圧駆動機構とを備えた粉末成形装置において、上記加圧成形された成形体を上記ダイスから離型させた状態で所定位置に保持する成形体保持手段を設けたことを特徴としている。

[0011]

請求項2の発明は、請求項1において、上記成形体保持手段は、上記上,下パンチユニットの何れかを上記成形体に係合させることにより保持するように構成されていることを特徴としている。

[0012]

請求項3の発明は、請求項1又は2において、上記成形体保持手段は、上記ダイスに配設された係合片を上記成形体に係合させることにより保持するように構成されていることを特徴としている。

[0013]

請求項4の発明は、請求項1ないし3の何れかにおいて、上記成形体保持手段は、上記成形体の少なくとも一部を囲むように形成されたガイド部材を上記成形体に係合させることにより保持するように構成されていることを特徴としている

[0014]

請求項5の発明は、請求項1ないし4の何れかにおいて、上記成形体保持手段は、押圧機構により上記成形体を押圧保持するように構成されていることを特徴としている。

[0015]

請求項6の発明は、請求項1ないし5の何れかにおいて、上記成形体保持手段は、流体圧力発生機構による流体圧と大気圧との圧力差により上記成形体を保持

するように構成されていることを特徴としている。

[0016]

請求項7の発明は、請求項1と同様の粉末成形装置において、上記上,下パンチユニットをダイスに位置決めするパンチ位置決め手段を設けたことを特徴としている。

[0017]

請求項8の発明は、請求項7において、上記パンチ位置決め手段は、上記上、下パンチユニットの少なくとも一方に装着されたテーパブロックと、上記ダイスに形成されたテーパ部とからなり、該テーパ部に上記テーパブロックをテーパ嵌合させることにより位置決めするように構成されていることを特徴としている。

[0018]

請求項9の発明は、請求項8において、上記テーパブロックは、上記上,下パンチユニットとは独立して駆動されるように構成されていることを特徴としている。

[0019]

請求項10の発明は、請求項7において、上記パンチ位置決め手段は、上記ダイスに形成された位置決め孔と、上記上、下パンチユニットの少なくとも一方に形成され尖部を有するガイドピンとからなり、該尖部を上記位置決め孔に係合させることにより位置決めするように構成されていることを特徴としている。

[0020]

請求項11の発明は、請求項8又は9において、上記ダイス又はテーパブロックに粉末成形空間内の空気を吸引することにより減圧する減圧手段が配設されていることを特徴としている。

[0021]

請求項12の発明は、請求項11において、上記減圧手段は、上記ダイス又は テーパブロックに上記粉末成形空間に連通するように形成された減圧通路と、該 減圧通路に接続された真空発生源とから構成されていることを特徴としている。

[0022]

請求項13の発明は、請求項11において、上記テーパブロックは、上記ダイ

スの粉末成形空間及びその周囲を気密に囲むように形成されており、該テーパブ ロックに上記減圧通路が形成されていることを特徴としている。

[0023]

請求項14の発明は、請求項11ないし13の何れかにおいて、上記減圧手段は、上記粉末成形空間に粉末を供給するときに減圧を開始し、該減圧状態を少なくとも加圧成形を行なうときまで維持するように構成されていることを特徴としている。

[0024]

請求項15の発明は、粉末成形空間を有するダイスと上、下パンチユニットとからなる金型と、該金型を少なくとも粉末供給ステージ、加圧成形ステージ、成形体取り出しステージの間で搬送する金型搬送機構と、上記加圧成形ステージにて上記上、下パンチユニットをそれぞれ独立して駆動することにより加圧成形を行なう加圧駆動機構とを備えた粉末成形装置において、上記上、下パンチユニットの加圧移動方向と直交方向に移動させることにより上、下パンチユニットの少なくとも一方を上記加圧駆動機構に着脱可能に連結する連結手段を設けたことを特徴としている。

[0025]

請求項16の発明は、請求項15において、上記連結手段は、上記加圧駆動機構に配置固定されたクランプ本体と、該クランプ本体に上記直交方向に移動可能に支持されたスライド爪と、該スライド爪を上記パンチュニットを加圧駆動機構に連結する連結位置と、該連結を解除する非連結位置との間で駆動するスライド駆動機構とから構成されていることを特徴としている。

[0026]

請求項17の発明は、請求項16において、上記スライド爪は、上記パンチユニットにテーパ嵌合するテーパ部を備えていることを特徴としている。

[0027]

請求項18の発明は、請求項16又は17において、上記スライド駆動機構は 、上記スライド爪を直線駆動するように構成されていることを特徴としている。

[0028]

請求項19の発明は、請求項16又は17において、上記スライド駆動機構は 、上記スライド爪を回転駆動するように構成されていることを特徴としている。

[0029]

請求項20の発明は、請求項15と同様の粉末成形装置において、上記各ステージ間を搬送するときには上記下パンチユニットをダイスに保持し、上記何れかのステージに搬送したときには上記保持を解除するユニット保持手段を備えたことを特徴としている。

. [0030]

請求項21の発明は、請求項20において、上記ユニット保持手段は、上記下 パンチユニットを加圧方向に移動可能に支持するガイド機構と、上記下パンチユ ニットを上記ガイド機構に固定保持する保持機構とを備えていることを特徴とし ている。

[0031]

請求項22の発明は、請求項21において、上記保持機構は、上記下パンチユニットに回転軸を介して軸支された締結レバーと、該締結レバーを回転軸を中心に回動付勢することにより上記ガイド機構に面接触させて上記下パンチユニットを固定保持する付勢部材とを備えており、上記締結レバーを反付勢方向に回動させることにより上記固定保持を解除するように構成されていることを特徴としている。

[0032]

請求項23の発明は、請求項22において、上記締結レバーには、上記ガイド機構との固定力を増強させる永久磁石,あるいは電磁石が配設されていることを 特徴としている。

[0033]

請求項24の発明は、請求項21において、上記保持機構は、上記下パンチュニットに回転軸を介して軸支された締結レバーと、該締結レバーを上記ガイド機構に磁力により面接触させて上記下パンチユニットを吸着保持する永久磁石と、通電することにより上記永久磁石の磁力をキャンセルして吸着力を弱める電磁石とを備えていることを特徴としている。

[0034]

請求項25の発明は、請求項21において、上記保持機構は、上記下パンチュニットに移動可能に支持されたカム部材と、該カム部材を上記ガイド機構に線接触による摩擦力でもって上記下パンチュニットを押圧固定する押圧部材とを備えており、上記カム部材を反押圧方向に移動させることにより上記押圧固定を解除するように構成されていることを特徴としている。

[0035]

請求項26の発明は、請求項25において、上記カム部材は、上記下パンチユニットに回転対偶を介して回動可能に支持された回転カムにより構成されていることを特徴としている。

[0036]

請求項27の発明は、請求項25において、上記カム部材は、上記下パンチュニットに直動対偶を介して直線移動可能に支持された直動カムにより構成されていることを特徴としている。

[0037]

請求項28の発明は、請求項20において、上記ユニット保持手段は、上記下 パンチユニットを加圧方向に移動可能に支持するガイド機構と、該ガイド機構と は独立して設けられたブレーキ部材と、該ブレーキ部材に上記下パンチユニット を固定保持する保持機構とを備えていることを特徴としている。

[0038]

請求項29の発明は、請求項28において、上記保持機構は、上記下パンチユニットに回転軸を介して軸支された締結レバーと、該締結レバーを回転軸を中心に回動付勢することにより上記ブレーキ部材に面接触させて上記下パンチユニットを固定保持する付勢部材とを備えており、上記締結レバーを反付勢方向に回動させることにより上記固定保持を解除するように構成されていることを特徴としている。

[0039]

請求項30の発明は、請求項29において、上記締結レバーには、上記ブレー キ部材との固定力を増強させる永久磁石,あるいは電磁石が配設されていること を特徴としている。

[0040]

請求項31の発明は、請求項28において、上記保持機構は、上記下パンチュニットに回転軸を介して軸支された締結レバーと、該締結レバーを上記ブレーキ部材に磁力により面接触させて上記下パンチュニットを吸着保持する永久磁石と、通電することにより上記永久磁石の磁力をキャンセルして吸着力を弱める電磁石とを備えていることを特徴としている。

. [0041]

請求項32の発明は、請求項28において、上記保持機構は、上記下パンチュニットに移動可能に支持されたカム部材と、該カム部材を上記ブレーキ部材に線接触による摩擦力でもって上記下パンチュニットを押圧固定する押圧部材とを備えており、上記カム部材を反押圧方向に移動させることにより上記押圧固定を解除するように構成されていることを特徴としている。

[0042]

請求項33の発明は、請求項32において、上記カム部材は、上記下パンチユニットに回転対偶を介して回動可能に支持された回転カムにより構成されていることを特徴としている。

[0043]

請求項34の発明は、請求項32において、上記カム部材は、上記下パンチユニットに直動対偶を介して直線移動可能に支持された直動カムにより構成されていることを特徴としている。

[0044]

請求項35の発明は、粉末成形空間を有するダイスと上、下パンチユニットとからなる金型と、該金型を少なくとも粉末供給ステージ、加圧成形ステージ、成形体取り出しステージの間で搬送する金型搬送機構と、上記加圧成形ステージにて上記上、下パンチユニットをそれぞれ独立して駆動することにより加圧成形を行なう加圧駆動機構とを備えた粉末成形装置において、上記加圧成形された成形体を上記ダイスから離型させた状態で所定位置に保持する成形体保持手段と、上記上、下パンチユニットをダイスに位置決めするパンチ位置決め手段と、上記上

,下パンチユニットの加圧移動方向と直交方向に移動させることにより上,下パンチユニットの少なくとも一方を上記加圧駆動機構に着脱可能に連結する連結手段と、上記各ステージ間を搬送するときには上記下パンチユニットをダイスに保持し、上記何れかのステージに搬送したときには上記保持を解除するユニット保持手段とを備えたことを特徴としている。

[0045]

【発明の作用効果】

請求項1の発明にかかる粉末成形装置によれば、ダイスから離型させた成形体 を成形体保持手段により保持したので、成形体を搬送する際に該成形体が倒れた り、位置ずれしたりするのを防止でき、ひいては搬送速度の高速化に対応でき、 生産能力を向上できる。

[0046]

請求項2の発明では、下パンチユニットを成形体に係合させることにより保持したので、下パンチユニットを成形体の形状に応じて、例えば成形体の凹部や凸部に嵌装させることにより確実に保持でき、別の保持機構を設ける場合に比べてコスト上昇を回避できる。

[0047]

請求項3の発明では、ダイスに配設された係合片を成形体に係合させて保持するので、搬送中に倒れたり、ずれたりするのを防止でき、この場合にも搬送速度の高速化に対応できる。

[0048]

請求項4の発明では、ガイド部材により成形体を囲むようにして保持するので、重力に依存しない搬送を行なうことができ、上記同様に搬送速度の高速化に対応できる。

[0049]

請求項5の発明では、押圧機構により成形体を押圧保持するので、重力に依存 しない搬送を行なうことができ、搬送速度のさらなる高速化に対応できる。

[0050]

請求項6の発明では、流体圧力発生機構により成形体を保持するので、例えば

加圧空気,あるいは真空吸引により成形体を保持することにより、上記同様に搬送速度の高速化に対応できる。

[0051]

請求項7の発明によれば、上、下パンチュニットをダイスに位置決めするパンチ位置決め手段を設けたので、例えば下パンチュニットをダイスとともに搬送するようにした場合の上パンチュニットとダイスとの位置決めを確実に行なうことができ、成形体の品質、寸法精度を確保できる。

. [0052]

請求項8の発明では、上パンチユニットにテーパブロックを挿着するとともに、該テーパブロックをダイスに形成されたテーパ部にテーパ嵌合させたので、簡単な構造で位置決めを確実に行なうことができる。

[0053]

請求項9の発明では、上記テーパブロックを上パンチユニットとは独立して駆動したので、テーパブロックをダイスに予め位置決めした状態で上、下パンチユニットを加圧駆動することによって金型の破損等の問題を防止でき、成形体の品質、寸法精度を確保できる。

[0054]

請求項10の発明では、上パンチユニットに形成されたガイドピンの尖部をダイスに形成された位置決め孔に係合させて位置決めしたので、請求項7と同様に位置決めを確実に行なうことができ、成形体の品質、寸法精度を確保できる。

[0055]

請求項11の発明によれば、ダイス及び上、下パンチユニットで形成された粉末成形空間内の空気を吸引減圧したので、ダイス内に充填された粉末の空隙を小さくすることができ、粉末密度のばらつきを防止できるとともに、加圧成形時間を短縮できる。

[0056]

請求項12の発明では、上記ダイス又はテーパブロックに減圧通路を形成し、 該減圧通路に真空発生源を接続したので、簡単な構造で減圧手段を構成でき、コ スト上昇を抑制できる。 [0057]

請求項13の発明では、テーパブロックをダイスの粉末成形空間及びその周辺 を囲むように形成したので、ダイス周囲への粉末の飛散を防止できる。

[0058]

請求項14の発明では、ダイスに粉末を充填するときに減圧を開始し、該減圧 状態を加圧成形を行なうまで維持したので、上記ダイスに粉末を供給する際の充 填速度を高めることができるとともに、充填時の粉末飛散を防止でき、さらには 加圧時の減圧を不要にでき、ひいては加圧成形時間を短縮できる。

[0059]

請求項15の発明によれば、連結手段により加圧方向と直交方向に移動させることにより下パンチユニットを加圧駆動機構に着脱可能に連結したので、連結方向に加圧力が作用することはなく、ひいては連結手段をコンパクトにすることができる。即ち、従来の連結方向を加圧方向と同じ方向とした場合には、加圧成形後の脱型工程で、金型と成形体とがスムーズに離型し難くなり、成形体が損傷するおそれがあった。このため連結手段及びその周辺部品の強度アップを図る必要があり、構造が複雑化するという問題を発明は解決するものである。

[0060]

請求項16の発明では、連結手段を加圧駆動機構に配置固定されたクランプ本体と、該クランプ本体に移動可能に配設されたスライド爪と、該スライド爪を移動駆動するスライド爪駆動機構とから構成したので、スライド爪をクランプ本体から進退駆動するという簡単な構造でもって連結,連結解除操作を行なうことができ、コスト上昇を抑制できる。

[0061]

請求項17の発明では、スライド爪に下パンチユニットにテーパ嵌合するテーパ部を形成したので、下パンチユニットと加圧駆動機構との連結を確実に行なうことができるとともに、位置決め精度を高めることができる。

[0062]

請求項18の発明では、スライド爪を直線移動させて連結・連結解除を行なうようにしたので、連結力を高めることができる。

[0063]

請求項19の発明では、スライド爪を回転させて連結・連結解除を行なうよう にしたので、スライド爪の回転力を小さくすることができ、駆動部をコンパクト にできる。

[0064]

請求項20の発明によれば、下パンチユニットを各ステージ間を搬送するときにはダイスに保持し、何れかのステージに搬送したときには保持を解除するようにしたので、搬送中に下パンチユニットが移動したり、脱落したりするのを防止できる。またステージに搬送したときには下パンチユニットの保持を解除するので、下パンチユニットの駆動を支障なく行なうことができる。

[0065]

請求項21の発明では、ガイド機構により下パンチユニットを加圧方向に移動可能に支持し、保持機構により下パンチユニットをガイド機構に固定保持するようにしたので、簡単な構造により下パンチユニットを保持、保持解除を行なうことができ、コストの上昇を抑制できる。

[0066]

請求項22の発明では、下パンチユニットに軸支された締結レバーを付勢部材によりガイド機構に面接触させて下パンチユニットを固定保持するようにしたので、簡単な構造でしかも必要最小限の部品点数でもって下パンチユニットを保持することができる。

[0067]

請求項23の発明では、締結レバーにガイド機構との固定力を増強させるための永久磁石,電磁石を配設したので、下パンチユニットをより強固に固定保持できる。

[0068]

請求項24の発明では、締結レバーを永久磁石によりガイド機構に磁力により 面接触させて吸着保持し、該保持を解除するときには電磁石に通電することによ り上記永久磁石の吸着力を弱めるようにしたので、保持、保持解除を電気的に行 うことができる。 [0069]

請求項25の発明では、下パンチユニットに移動可能に支持されたカム部材をガイド機構に線接触による摩擦力でもって上記下パンチユニットを押圧固定するようにしたので、カム部材のくさび効果を利用することによってガイド機構との線接触圧力を増大させることができ、下パンチユニットを確実に保持することができる。これによりカム部材とガイド機構との加工精度、組立精度にばらつきが生じた場合にも該ばらつきを吸収して十分な接触力を得ることができ、下パンチユニットの位置ずれを防止できる。

[0070]

請求項26の発明では、カム部材を回転カムにより構成したので、簡単な構造でしかも必要最小限の部品点数でもって下パンチュニットを確実に固定保持することができる。

[0071]

請求項27の発明では、カム部材を直動カムにより構成したので、ガイド機構への接触圧力をさらに増大させることができ、下パンチュニットをより確実に保持することができる。

[0072]

請求項28の発明では、ガイド機構により下パンチュニットを加圧方向に移動可能に支持し、該ガイド機構とは独立した設けられたブレーキ部材に下パンチュニットを固定保持したので、例えば下パンチュニットをガイド機構に固定する場合の該下パンチュニットの固定保持に伴うガイド機構の磨耗を防止でき、ガイド機構の寿命及び下パンチュニットの支持精度を向上できる。またブレーキ部材をガイド機構とは異なる構造、材質のものにより構成することができ、摩擦係数が大きく、かつコストの低い材料を選択することが可能となる。

[0073]

請求項29の発明では、下パンチユニットに軸支された締結レバーを付勢部材によりブレーキ部材に面接触させて下パンチユニットを固定保持するようにしたので、簡単な構造により下パンチユニットを保持、保持解除を行なうことができ、コストの上昇を抑制できる。

[0074]

請求項30の発明では、締結レバーにブレーキ部材との固定力を増強させる永久磁石、電磁石を配設したので、下パンチユニットをより強固に固定保持できる

[0075]

請求項31の発明では、締結レバーを永久磁石によりブレーキ部材に磁力により面接触させて吸着保持し、該保持を解除するときには電磁石に通電することにより上記永久磁石の吸着力を弱めるようにしたので、保持、保持解除を電気的に行なうことができる。

[0076]

請求項32の発明では、下パンチユニットに移動可能に支持されたカム部材を ブレーキ部材に線接触による摩擦力でもって上記下パンチユニットを押圧固定す るようにしたので、カム部材のくさび効果を利用することによってブレーキ部材 との線接触圧力を増大させることができ、下パンチユニットを確実に保持するこ とができ、請求項25の発明と同様の効果が得られる。

[0077]

請求項33の発明では、カム部材を回転カムにより構成したので、簡単な構造でしかも必要最小限の部品点数でもって下パンチユニットを確実に固定保持することができる。

[0078]

請求項34の発明では、カム部材を直動カムにより構成したので、ブレーキ部材への接触圧力をさらに増大させることができ、下パンチユニットをより確実に保持することができる。

[0079]

請求項35の発明では、ダイスから離型させた成形体を成形体保持手段により保持したので、成形体を搬送する際に該成形体が倒れたり、位置ずれしたりするのを防止でき、ひいては搬送速度の高速化に対応でき、生産能力を向上できる。また、上、下パンチユニットをダイスに位置決めするパンチ位置決め手段を設けたので、例えば下パンチユニットをダイスとともに搬送するようにした場合の上

パンチュニットとダイスとの位置決めを確実に行なうことができ、成形体の品質, 寸法精度を確保できる。さらに、連結手段により加圧方向と直交方向に移動させることにより下パンチュニットを加圧駆動機構に着脱可能に連結したので、連結方向に加圧力が作用することはなく、ひいては連結手段をコンパクトにすることができる。上記下パンチュニットを各ステージ間を搬送するときにはダイスに保持し、何れかのステージに搬送したときには保持を解除するようにしたので、搬送中に下パンチュニットが移動したり、脱落したりするのを防止できる。またステージに搬送したときには下パンチュニットの保持を解除するので、下パンチュニットの駆動を支障なく行なうことができる。

[0080]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。

[0081]

図1ないし図15は、請求項1,2,7,8,9,11,12,14,15,16,17,20,21,22,28の発明の第1実施形態による粉末成形装置を説明するための図であり、図1,図2は粉末成形装置の概略構成図,斜視図、図3は搬送テーブルの回転動作を示す平面図、図4は粉末注入機構の動作を示す図、図5,図6は金型の成形体位置決め手段を示す断面図、図7はテーパブロックの昇降機構を示す断面図、図8,図9,図10は連結手段の分解斜視図,斜視図,断面図、図11,図12はユニット保持手段の断面図,平面図、図13,図14,図15はそれぞれ下パンチユニットによる成形体の保持状態を示す図である。

[0082]

図において、1はセラミックス粉末原料を加圧成形することによりセラミック電子部品素子を製造する粉末成形装置を示している。この粉末成形装置1は、粉末成形空間を有するダイス5と上、下パンチユニット6、7とからなる金型2と、該金型2を粉末供給ステージA、加圧成形ステージB、機械加工ステージC、成形体取り出しステージDの間で搬送する円板状の搬送テーブル(金型搬送機構)8と、上記セラミック粉末原料の加圧成形を行なう加圧駆動機構3と、上記各

ステージA~Dの所定位置に下パンチユニット7を加圧駆動機構3に着脱可能に連結する連結手段9と、上記下パンチユニット7を搬送テーブル8に着脱可能に保持するユニット保持手段4と、上記粉末供給ステージAにて金型2に粉末原料を注入する粉末注入機構100とを備えている。

[0083]

上記ダイス5は搬送テーブル8の外周部に90度角度毎に配置固定されている。上記上パンチュニット6は円筒状の上第1パンチ6a内にコアピンからなる上第2パンチ6bを相対移動可能に挿入してなり、また上記下パンチュニット7は上記同様に円筒状の下第1パンチ7a内にコアピンからなる下第2パンチ7bを相対移動可能に挿入してなるものである。上記上パンチュニット6は加圧成形ステージBにのみ配設されており、上記下パンチュニット7は搬送テーブル8の各ダイス5の下方に配設されている。

[0084]

上記搬送テーブル8は外付けの回転駆動機構(不図示)により回転駆動され、 上記金型2を粉末供給ステージA,粉末加圧ステージB,機械加工ステージC, 成形体取り出しステージDの順に連続して搬送するように構成されている。

[0085]

上記搬送テーブル8は、図3に示すように、後述する粉末注入機構100によりダイス5内にセラミック粉末原料が充填されると矢印a方向に90度回転する。これによりセラミック粉末原料が充填された金型2は粉末加圧ステージBに搬送され、ここで上、下パンチユニット6、7により加圧成形が行われる。このとき上記粉末供給ステージAに搬送された次のダイス5内にセラミック粉末原料が充填される。

[0086]

加圧成形が終了すると、搬送テーブル8が90度回転し、加圧成形された成形体は機械加工ステージCに搬送され、ここで切削,孔あけ,あるいはバリ取り等の機械加工が行われる。このとき上記粉末加圧ステージBでは次のセラミック粉末の加圧成形が行われ、上記粉末供給ステージAではその次のダイス5にセラミック粉末が充填される。

[0087]

そして機械加工ステージCにて所定の機械加工が終了すると、搬送テーブル8が90度回転し、加工済み成形体を成形体取り出しステージDに搬送し、ここで成形体を外部に取り出し、所定の個所に回収する。この後、空になったダイス5は粉末供給ステージAに再度搬送される。このようにして搬送テーブル8を順次回転させることにより成形体が連続生産される。

[0088]

上記粉末注入機構100は、搬送テーブル8の上方に昇降可能に配置された略密閉箱状の粉末貯蔵部101と、該粉末貯蔵部101内に粉末原料105を供給する粉末供給管102と、上記粉末貯蔵部101の底壁101aの中心部に形成され、上記ダイス5内に粉末原料105を注入する粉末注入孔101bと、該粉末注入孔101bを開閉する擦切り刃103とを備えている。

[0089]

上記粉末供給管102は、上記粉末注入孔101bに臨む位置より側方にオフセットさせて配置されており、かつ天壁101cを貫通して粉末貯蔵部101内の上下中間部分に位置するように挿入されている。また上記粉末供給管102の上流端にはホッパ(不図示)が接続されている。

[0090]

上記擦切り刃103はセラミック製のものからなり、この先端刃103 a は鋭角に形成されている。この擦切り刃103は、粉末貯蔵部101の外側に配置されたアクチュエータ107に支持部材106を介して連結されており、該アクチュエータ107により上記粉末注入孔101bを閉じる閉位置と、該擦切り刃注入孔101bを開ける開位置との間で開閉駆動される。上記支持部材106は粉末貯蔵部101の側壁101dに形成されたスリット108を介して上記アクチュエータ107に連結されている。

[0091]

また上記粉末注入孔101bの縁部には上記擦切り刃103の先端刃103a が係合するテーパ部109が形成されている。上記擦切り刃103が開位置から 閉位置に移動すると、先端刃103aがテーパ部109に当接して少し乗り上げ るようになっている。

[0092]

上記粉末注入機構100は、図4(a)~図4(d)に示すように、粉末供給ステージAにダイス5が搬送されると、待機位置にある粉末貯蔵部101が底壁101aがダイス5上面に当接する位置まで下降する。この下降位置において粉末注入孔101bとダイス5のキャビティとは一致している。

[0093]

上記アクチュエータ107により擦切り刃103が後方移動すると、粉末注入 孔101bが開き、該粉末注入孔101bから粉末原料105が流れ出て、ダイス5のキャビティ内に注入される。

[0094]

この後、アクチュエータ107により擦切り刃103が前方移動すると、先端刃103aがダイス5の上面を摺接しつつキャビティからはみ出た余分な粉末原料105を擦り切り、粉末貯蔵部101内に戻しつつ粉末注入孔101bを閉じる。このときに先端刃10aがテーパ部109に少し乗り上げて注入孔101bを閉塞する。この後、粉末貯蔵部101が上記待機位置に上昇する。

[0095]

上記加圧駆動機構3は、以下の構造となっている。上記搬送テーブル8の下方には駆動ベース10が上下動可能に配置されており、該駆動ベース10の下方には固定ベース11が移動不能に配置固定されている。この固定ベース11には駆動軸の一方を構成する上第1ボールねじ12,12が軸受13,13を介して回転自在に支持されており、該各軸受13は固定ベース11に取付け固定されている。上記各上第1ボールねじ12には上記駆動ベース10に取付け固定されたナット14,14が螺装されている。

[0096]

上記駆動ベース10には下向きコ字状の支持台17が取付け固定されており、 該支持台17の上面には駆動軸の他方を構成する円筒状の上第1支柱18,18 が立設されている。この各支柱18の上端間には上第1金型支持板19が架け渡 して固定されており、該上第1金型支持板19の下面に上記上第1パンチ6aが 取付け固定されている。上記各上第1ボールねじ12を回転させることにより駆動ベース10,両上第1支柱18とともに上第1パンチ6aが上下動するようになっている。

[0097]

上記駆動ベース10には上第2ボールねじ21,21が軸受22,22を介して回転自在に支持されており、該各軸受22は駆動ベース10に取付け固定されている。この各上第2ボールねじ21は、上記支持台17に摺動自在に支持された上第2支柱16,16内に挿入され、該上第2支柱16の下端部に挿入固定されたナット23に螺装されている。また上記上第2支柱16,16の上端間には上第2金型支持板20が架け渡して固定されており、該金型支持板20の下面に上記上第2パンチ6bが取付け固定されている。上記各上第2ボールねじ21を回転させることにより両上第2支柱16とともに上第2パンチ6bが上下動するようになっている。

[0098]

また上記各上第1支柱18,18は中空円筒状のものからなり、該各上第1支柱18内には、上記上第2支柱16,16が同一軸心をなすように相対移動可能に挿入されている。このように上第1支柱18内にこれと同一軸心をなすように上第2支柱16を挿入したので、各支柱を並列配置する場合に比べて駆動ベース10の横幅寸法を小さくすることができ、装置全体の小型化に貢献できる。

[0099]

上記駆動ベース10には下第1ボールねじ25,25が軸受26,26を介して回転自在に支持されており、該各軸受26は駆動ベース10に取付け固定されている。この各下第1ボールねじ25は、支持台17に摺動可能に支持された下第1支柱27,27内に挿入され、該下第1支柱27の下端部に挿入固定されたナット28,28に螺装されている。

[0100]

また上記各下第1支柱27の上端間には、上述の連結手段9を介在させて下第 1金型支持板29が着脱可能に連結されており、該金型支持板29の上面に上記 下第1パンチ7aが取付け固定されている。これにより各下第1ボールねじ25 を回転させることにより両下第1支柱27とともに下第1パンチ7aが上下動する。

[0101]

上記駆動ベース10の各下第1ボールねじ25の間には下第2ボールねじ30が軸受31を介して回転自在に支持されており、該軸受31は駆動ベース10に取付け固定されている。この下第2ボールねじ30は、支持台17に摺動自在に支持された下第2支柱32内に挿入され、該下第2支柱32の下端部に挿入固定されたナット33に螺装されている。

[0102]

また下第2支柱32の上端部には、上記連結手段9を介在させて下第2金型支持板34が着脱可能に連結されており、該金型支持板34の上面に上記下第2パンチ7bが取付け固定されている。上記下第2ボールねじ30を回転させることにより下第2支柱32とともに下第2パンチ7bが上下動する。このようにして全てのボールねじ12,21,25,30は駆動ベース10に集中させて配置されている。

[0103]

上記上第2ボールねじ21, 21及び下第1, 第2ボールねじ25, 25, 3 0は駆動ベース10を挿通して下方に突出しており、該各突出部にはそれぞれ従 動プーリ37, 44, 44, 45が装着されている。

[0104]

上記各上第2ボールねじ21の従動プーリ37には上第2タイミングベルト38が巻回されており、該タイミングベルト38は上第2サーボモータ39に装着された駆動プーリ40に巻回されている。これにより上第2サーボモータ39が回転すると両上第2支柱16とともに上第2パンチ6bが上下動する。

[0105]

上記各下第1ボールねじ25の従動プーリ44には下第1タイミングベルト46が巻回されており、該タイミングベルト46は下第1サーボモータ47に装着された駆動プーリ48に巻回されている。この下第1サーボモータ47が回転すると両下第1支柱27とともに下第1パンチ7aが上下動する。

[0106]

上記下第2ボールねじ30の従動プーリ45には下第2タイミングベルト49が巻回されており、該タイミングベルト49は下第2サーボモータ50の駆動プーリ51に巻回されている。この下第2サーボモータ50が回転すると下第2支柱32とともに下第2パンチ7bが上下動する。

[0107]

上記各上第1ボールねじ12は固定ベース11を挿通して下方に突出しており、該各突出部には従動プーリ43,43が装着されている。この各従動プーリ43には上第1タイミングベルト52が巻回されており、該タイミングベルト52は上第1サーボモータ53に装着された駆動プーリ54に巻回されている。

[0108]

上記各サーボモータ53,39,47,50は駆動ベース10周りに集中させて配置されており、上第1サーボモータ53は固定ベース11に、また上第1サーボモータ39及び下第1,第2サーボモータ47,50は駆動ベース10にそれぞれブラケット等を介して取付け固定されている。

[0109]

上記各サーボモータ53,39,47,50により上第1,第2パンチ6a,6b及び下第1,第2パンチ7a,7aをそれぞれ独立させて駆動することにより、例えば円筒状,円柱状,縦断面H形状,あるいは縦断面十字形状の成形体の加工が行えるようになっている。即ち、上第1,第2ボールねじ12,21の送りにより上第1,第2パンチ6a,6bが下降し、下第1,第2ボールねじ25,30の送りにより下第1,第2パンチ7a,7bが上昇し、これにより圧縮成形を行なう。この場合、駆動ベース10の下降に伴う下第1,第2パンチ7a,7bの下降は、下第1,第2ボールねじ25,30の送り量を上第1ボールねじ12の送り量により大きくすることにより吸収している。

[0110]

また、上記上第2サーボモータ39及び下第1, 第2サーボモータ47, 50の回転を停止させた状態で、上第1サーボモータ53が回転すると駆動ベース10とともに、上第1, 第2パンチ6a, 6b及び下第1, 第2パンチ7a, 7b

が同期して上下動する。このようにしてパンチ間距離を保持した状態で搬送テーブル8から成形体の脱型が行えるようになっている。即ち、加圧成形工程が終了すると、上第2サーボモータ39及び下第1,第2サーボモータ47,50を停止し、これにより上第2ボールねじ21及び下第1,第2ボールねじ25,30を固定する。この状態で上第1サーボモータ53により各上第1ボールねじ12を回転させる。すると駆動ベース10の上昇とともに上第1,第2パンチ6a,6b及び下第1,第2パンチ7a,7bがそれぞれパンチ間距離を保持した状態で上昇することとなる。

[0111]

上記金型2には加圧成形ステージBに搬送されたダイス5に上パンチユニット6を位置決めするパンチ位置決め手段が配設されている。この位置決め手段は、図5~図7に示すように、上パンチユニット6の第1パンチ6aが挿入されたテーパブロック60と、上記ダイス5の上開口部に一体形成されたテーパ部5aとから構成されており、上記テーパブロック60の下部内周面には上第1パンチ6aの径より大径の凹テーパ面60aが形成されている。

[0112]

上記ダイス5のテーパ部5 a は搬送テーブル8の上面から突出しており、該テーパ部5 a の外周面には上記凹テーパ面60 a がテーパ嵌合する凸テーパ面5 b が形成されている。また上記テーパブロック60は、昇降駆動機構58により上パンチュニット6とは独立して昇降駆動される。この昇降駆動機構58は、シリンダ58 a 内にテーパブロック60を挿入するとともに、該テーパプロック60 に装着固定されたピストン58 b により上記シリンダ58 a 内を2室に区分けした構造のものであり、シリンダ58 a 内の各室に圧縮空気を供給することによりテーパブロック60 が昇降するようになっている。

[0113]

上記テーパブロック60には粉末成形空間内の空気を吸引して減圧する減圧手段が設けられている。この減圧手段は、上記テーパブロック60に形成された減圧通路60bと、該減圧通路60bに吸引ホース61を介して連通接続された真空ポンプ(不図示)とから構成されている。また上記減圧手段は、粉末供給ステ

ージAにてダイス5に粉末原料を充填する際に粉末成形空間内の減圧を開始し、 この減圧を次の加圧成形ステージBにて加圧成形するまで維持するように構成さ れている。

[0114]

上記下パンチユニット7は成形体保持手段として機能している。この下パンチユニット7の第1,第2パンチ7a,7bは上述のように下第1,第2ボールねじ25,30によりそれぞれ独立駆動されており、該下第1,第2パンチ7a,7bを成形体の形状に合わせて係合させることにより保持するようになっている

[0115]

例えば、図13(a),(b)に示すように、成形体1Aが縦断面H形状の場合には、成形体1Aをダイス5から離型した後、下第2パンチ7bを成形体1Aの凹部に嵌装させることにより保持する。そしてこの状態で成形体取り出しステージDに搬送し、該ステージDにて下第2パンチ7bを下降させることにより成形体1Aを取り出すこととなる。

[0116]

また、図14(a), (b)に示すように、成形体1Bが縦断面十字形状の場合には、該成形体1Bの凸部に下第1パンチ7aを嵌装させることにより保持する。さらに図15(a), (b)に示すように、成形体1Cが円柱形状の場合には、離型した後、成形体1Cの一部をダイス5内に後退させ、該ダイス5と下パンチユニット7とで保持する。

[0117]

上記連結手段9は、各ステージA~Dに配置されており、上記下第1,第2金型支持板29,34が搬送されると下第1,第2支柱27,32に連結し、搬送するときには上記連結を解除するように構成されている。

[0118]

上記連結手段9は、図8~図10に示すように、各下第1支柱27の上端面に 固定されたクランプ本体63と、該クランプ本体63に水平方向(加圧方向と直 交方向)に進退可能に支持されたスライド爪64と、該スライド爪64を移動駆 動するエアシリンダ機構(スライド駆動機構)65とを備えている。上記クランプ本体63には下第1金型支持板29の下面を支持する座面63aが段付き形成されている。

[0119]

上記エアシリンダ機構65はシリンダ本体65a内にピストンロッド65bを 進退可能に挿入してなり、該ピストンロット65bには第1,第2リンク66, 67を介してスライド爪64が連結されている。

. [0120]

上記ピストンロッド65 b が収縮すると第1,第2リンク66,67が反時計周りに回動してスライド爪64を突出させ、該スライド爪64と座面63 a とで下第1金型支持板29をクランプし、もって両下第1支柱27により下第1パンチ7aを位置決め固定する。上記ピストンロッド65 b が伸張すると第1,第2リンク66,67が時計周りに回動してスライド爪64を後退させ、これにより下第1金型支持板29のクランプを解除する。

[0121]

また、上記下第2支柱32の上端面には一対のクランプ本体(不図示)が対向 するように配置固定されおり、該各クランプ本体に配設された各スライド爪(不 図示)により下第2金型支持板34をクランプ・アンクランプするように構成さ れており、基本的な構成は上述のものと略同様である。

[0122]

上記ユニット保持手段4は、搬送テーブル8の移動中は下パンチユニット7の下第1,第2金型支持板29,34を脱落不能に保持し、各ステージA~Dの所定位置では下第1,第2金型支持板29,34の保持を解除して下第1,第2パンチ7a,7bの上下動を許容するように構成されている。

[0123]

上記ユニット保持手段4は、図11及び図12に示すように、搬送テーブル8の下面に各ダイス5の外周部を囲むように挿入固定された複数本のガイドポスト (ガイド機構)70と、該ガイドポスト70に上下移動可能に挿着された下第1 ,第2金型支持板29,34と、各金型支持板29,34を上記ガイドポスト7 0に固定保持する保持機構とを備えている。上記各金型支持板29,34には各ガイドポスト70が挿通される挿入孔29a,34aが形成されている。

[0124]

上記保持機構は、各金型支持板29,34に回転軸72により揺動可能に軸支された締結レバー73と、該締結レバー73をガイドポスト70に押圧付勢するばね74とから構成されており、このばね74により締結レバー73をガイドポスト70に面接触させることにより下パンチユニット7を固定保持している。上記締結レバー73はガイドポスト70の外周面に沿うように湾曲形成された把持部73aと、該把持部73aに続いて上記スライド爪64に対向するように延びるアーム部73bとからなり、上記スライド爪64が突出してアーム部73bを反付勢方向に回動させることにより上記ガイドポスト70との締結を解除するようになっている。

[0125]

上記ユニット保持手段4及び連結手段9の動作について説明する。ユニット保持手段4により固定保持された下第1,第2金型支持板29,34が、例えば粉末供給ステージAから加圧成形ステージBに搬送されると、下第1,第2支柱27,32が上昇し、下第1,第2金型支持板29,34にクランプ本体63の座面63aが当接する。次いでスライド爪64が突出し、該スライド爪64とクランプ本体63とで各金型支持板29,34をクランプして位置決め固定する。この動作と同時にスライド爪64が締結レバー73を回動し、把持部73aがガイドポスト70から離れて締結を解除する。これにより下第1,第2パンチ7a,7bは上下動可能に下第1,第2支柱27,32に連結される。この状態で上,下パンチユニット6,7が上下動して上述の加圧成形が行われる。

[0126]

加圧成形が終了すると、スライド爪 6 4 が後退し、クランプを解除するとともに締結レバー 7 3 の押圧を解除し、締結レバー 7 3 はばね 7 4 の付勢力によりガイドポスト 7 0 に締結される。これにより連結が解除されるとともに、下第 1 , 第 2 パンチ 7 a , 7 b が搬送テーブル 8 に保持される。この状態で次の機械加工ステージCに搬送される。

[0127]

次に本実施形態の作用効果を説明する。

本実施形態の粉末成形装置1によれば、加圧成形ステージBにて加圧成形された成形体1Aを下パンチユニット7により保持した状態で機械加工ステージC,成形体取り出しステージDに搬送したので、搬送中に成形体1Aが倒れたり,位置ずれしたりするのを防止でき、ひいては搬送速度の高速化に対応でき、生産能力を向上できる。また下第1,第2パンチ7a,7bを成形体1A~1Cの形状に応じて嵌装させることにより容易確実に保持でき、別の保持機構を設ける場合に比べてコスト上昇を回避できる。

[0128]

なお、上記実施形態では、下第1, 第2パンチ7a, 7bにより成形体を保持 した場合を例に説明したが、本発明の成形体保持手段はこれに限られるものでは ない。

[0129]

図16(a)~図16(f)は、請求項3,4,5,6の発明の一実施形態による成形体保持手段を示しており、図中、図13~図15と同一符号は同一又は相当部分を示す。

[0130]

図16(a)は、ダイス5に出没可能に配設された係合片80を成形体1Dの外周面に係合させることにより保持した例である。図16(b)は、成形体1Dの外表面を囲むように形成されたガイド部材81により保持した例である。

[0131]

また図16(c)は、一対の押圧部材(押圧機構)82,82により成形体1 Dを水平方向に挟持して保持した例であり、図16(d)は、成形体1Dの上方から押圧部材(押圧機構)83を押しつけて保持した例である。

[0132]

図16(e)は、下第1パンチ7a及び搬送テーブル8に粉末成形空間内に連通する吸引通路(流体圧力発生機構)84を形成し、吸引ポンプにより吸引通路84を介して粉末成形空間内の空気を吸引することにより成形体1Dを保持した

例である。また図16(f)は、空気圧力供給部材85により加圧空気を成形体1Dに付加することにより保持した例である。上記何れの例においても、搬送中に成形体1Dが倒れたり,位置ずれしたりするのを防止でき、搬送速度の高速化に対応できる。

[0133]

さらに、本発明では、図17(a)~図17(f)に示すように、上述の下パンチユニット7と係合片80,ガイド部材81,等とを組み合わせることにより成形体を保持してもよい。例えば、図17(a)は、下第2パンチ7aと係合片80及びガイド部材81とで成形体1Eを保持した例であり、図17(b)は、下第1,第2パンチ7a,7bとガイド部材81とで成形体1Eを保持した例である。また図17(c)は、下第2パンチ7bと一対の押圧部材82,82とで成形体1Eを保持した例であり、図17(d)は、下第2パンチ7bと押圧部材83とで保持した例である。さらに図17(e)は、係合片80と吸引通路84とで成形体1Eを保持した例であり、図17(f)は、下第1パンチ7aと空気圧力供給部材85とで成形体1Eを保持した例である。この何れの場合にも、上記同様に搬送速度の高速化に対応でき、要は成形体の形状、搬送速度等に応じて何れかを単独で用いたり、組み合わせたりする。

[0134]

本実施形態によれば、上第1パンチ6aにテーパブロック60を挿着するとともに、該テーパブロック60の凹テーパ面60aをダイス5の凸テーパ面5bにテーパ嵌合させて位置決めしたので、下パンチユニット7を搬送テーブル8により各ステージA~D間を搬送する場合の上パンチユニット6との位置決めを簡単な構造で確実に行なうことができ、成形体の品質、寸法精度を確保できる。

[0135]

また上記テーパブロック60を上第1,第2パンチ6a,6bとは独立して昇降駆動したので、テーパブロック60をダイス5に予め位置決めした状態で上,下パンチユニット6,7を加圧駆動することができ、金型の破損等の問題を防止でき、成形体の品質,寸法精度を向上できる。

[0136]

なお、上記実施形態では、上パンチユニット7をテーパブロック60を介してダイス5にテーパ嵌合させた場合を説明したが、本発明のパンチ位置決め手段はこれに限られるものではなく、例えば図18に示すように、上第1パンチ7aが固定された上第1金型支持板19に尖部88aが形成されたガイドピン88を固定し、搬送テーブル8又はダイス5に上記尖部88aが係合する位置決め孔89を形成してもよい。このようにしたのが請求項10の発明である。この場合にも、上記実施形態と同様に位置決めを確実に行なうことができる。

. [0137]

本実施形態では、上記テーパブロック60にダイス5の粉末成形空間に連通する減圧通路60bを形成し、該減圧通路60bに吸引ホース61を介して真空ポンプを接続して上記粉末成形空間内の空気を減圧したので、簡単な構造でもって、ダイス5内に充填された粉末の空隙を小さくすることができ、粉末密度のばらつきを防止できるとともに、加圧成形時間を短縮できる。

[0138]

また粉末供給ステージAにてダイス5に粉末を充填するときに減圧を開始し、 該減圧を加圧成形ステージBにて加圧成形を行なうまで維持したので、上記ダイス5に粉末を供給する際の充填速度を高めることができるとともに、充填時の粉 末飛散を防止でき、さらには加圧時の減圧を不要にできる分だけ加圧時間を短縮 できる。

[0139]

なお、上記実施形態では、位置決め用のテーパブロック60に減圧通路を形成したが、本発明はこれに限られるものではない。例えば、ダイスの粉末成形空間及びその周辺を囲むように形成された箱状のブロックに減圧通路を接続形成してもよく、このようにしたのが請求項13の発明である。この場合には、ダイス周囲への粉末の飛散を防止できる。

[0140]

本実施形態によれば、下パンチユニット7と駆動部としての下第1,第2支柱27,32とを着脱可能に連結する連結手段9を、各支柱27,32に配置固定されたクランプ本体63と、該クランプ本体63に加圧方向と直交方向に移動可

能に支持されたスライド爪64と、該スライド爪64を進退駆動するエアシリンダ機構65とから構成したので、スライド爪64を進退駆動するエアシリンダ機構65に加圧成形時の加圧力が加わることはなく、加圧力はメカ構造で受けることが可能となる。これによりエアシリンダ機構65の駆動部をコンパクトにすることができる。即ち、上記スライド爪64を加圧方向と同じ方向に移動させた場合には、例えば加圧成形後の脱型工程で、金型と成形体とがスムーズに離型し難くなり、成形体が損傷するおそれがある。このためエアシリンダ機構65及びその周辺部品の強度アップを図る必要があり、構造が複雑化するという問題が生じる。

[0141]

上記クランプ本体63とスライド爪64とのクリアランスを小さくすることにより、金型支持板29,34をがたを生じることなくクランプすることができ、 位置決め精度を向上することができる。

[0142]

また上記スライド爪64を第1,第2リンク66,67を介して進退駆動したので、スライド爪64を小さい力で駆動することができ、エアシリンダ機構65をコンパクトにできる。

[0143]

ここで、図19に示すように、上記スライド爪64にテーパ部64aを形成し、該テーパ部64aを金型支持板29のテーパ面にテーパ嵌合させるようにしてもよく、このようにしたのが請求項17の発明である。この場合には、金型支持板29を精度よくかつ確実にクランプすることができる。

[0144]

なお、上記実施形態では、スライド爪64とクランプ本体63の座面63aとで金型支持板29,34をクランプした場合を説明したが、本発明はこれに限られるものではない。例えば、図20(a)に示すように、コ字状のスライド爪90を進退駆動することにより金型支持板29を把持したり、あるいは図20(b)に示すように、突起部91aを有するスライド爪91を進退駆動することにより、金型支持板29の凹部29aに嵌合させるようにしてもよく、この場合にも

上記実施形態と同様の効果が得られる。

[0145]

また、上記実施形態では、各スライド爪64,90,91を直線移動させることにより連結・連結解除を行なうようにしたが、本発明は、上記各スライド爪を回転駆動することにより連結・連結解除を行なうことも可能であり、このようにしたのが請求項19の発明である。例えば、図21(a),(b)に示すように、左右一対のコ字型スライド爪90に回転リンク機構93を介して1つのロータリアクチュエータ94を接続し、上記各スライド爪90を回転駆動することにより金型支持板29を連結・連結解除するようにしてもよい。この場合には、1つのアクチュエータ94で複数のスライド爪90を同期させて駆動することができる。コンパクト化が可能となるとともに、コストダウンを図ることができる。

[0146]

本実施形態によれば、下パンチユニット7を各ステージA~D間を搬送するときには保持し、何れかのステージA~Dに搬送したときには上記保持を解除するユニット保持手段4を設けたので、即ち、下パンチユニット7を加圧駆動機構3の各支柱27,32に連結するときには保持を解除して下パンチユニット7の上下動を許容し、上記連結を解除したときには下パンチユニット7を搬送テーブル8に保持するので、パンチ位置を保持した状態で下パンチユニット7を搬送でき、また搬送中に下パンチユニット7が移動したり、脱落したりするのを防止できる。これにより従来のカムフォロア及び軌道レールにより金型を搬送保持する場合に比べて、省スペース化を図ることができるとともに、コストを低減できる。

[0147]

また上記ユニット保持手段4を、搬送テーブル8に固定された複数本のガイドポスト70と、該ガイドポスト70に上下動可能に挿着された下第1,第2金型支持板29,34と、該金型支持板29,34を上記ガイドポスト70に固定保持する締結レバー73とから構成したので、簡単な構造により下パンチユニット7の保持,保持解除を行なうことができ、コスト上昇を抑制できる。

[0148]

さらに上記締結レバー73をばね74により付勢することによりガイドポスト

70に固定したので、簡単な構造でしかも必要最小限の部品点数でもって下パン チュニット7を保持することができ、コスト上昇を抑制できる。

[0149]

本実施形態では、連結手段9のスライド爪64の進退動作に連動して上記締結 レバー73を回動操作するようにしたので、別な機構による保持・保持解除操作 を不要にでき、コスト上昇を抑制できる。また下パンチユニット7を上記連結位 置に保持した状態で次のステージに搬送することができ、下パンチユニット7の 位置精度を確保できる。

[0150]

なお、上記実施形態では、締結レバー73をばね74の付勢力によりガイドポスト70に面接触により固定した場合を説明したが、本発明は、図22に示すように、締結レバー73の把持部73aに永久磁石95を配置し、該永久磁石95により締結力を増強させるようにしてもよく、このようにしたのが請求項23の発明である。この場合には、下パンチユニット7をより強固に保持することができる。

[0151]

また、図23に示すように、締結レバー73の把持部73aに永久磁石95を配置するとともに、締結レバー73に電磁石96を配設し、上記永久磁石95により下パンチユニット7をガイドポスト70に吸着保持し、該保持を解除するときには上記電磁石96に通電することにより永久磁石95の磁力をキャンセルしするように構成してもよく、このようにしたのが請求項24の発明である。

[0152]

ここで、上述の各実施形態では、締結レバー73をガイドポスト70にばね74,永久磁石95等により固定した場合を説明したが、本発明は、図示していないが、ガイドポストとは独立して円柱状のブレーキ部材を配設し、該ブレーキ部材に締結レバーを面接触させることにより金型支持板を固定保持するようにしてもよく、このようにしたのが請求項28,29,30,31の発明である。

[0153]

上記ブレーキ部材をガイドポストとは独立して配設し、該ブレーキ部材に締結

レバーを固定して金型支持板を保持した場合には、締結レバーをガイドポストに 固定する場合に比べて該ガイドポストの磨耗を防止でき、ガイドポストの寿命及 び金型支持板の支持精度を向上できる。またブレーキ部材をガイドポストとは異 なる材質のものにより構成することができ、摩擦係数が大きく,かつコストの低 い材料を選択することが可能となる。

[0154]

図31は、請求項25,26の発明の一実施形態による保持機構を説明するための図であり、図中、図12と同一符号は同一又は相当部分を示す。

[0155]

本実施形態の保持機構は、金型支持板29に回転軸300により回動可能に支持された回転カム部材301と、該回転カム部材301をガイドポスト70に押圧付勢するばね(押圧部材)302とから構成されており、このばね302により回転カム部材301の回転カム301aをガイドポスト70に線接触による摩擦力でもって押圧固定している。またスライド爪64が突出して回転カム部材301を反付勢方向に回動させることにより上記ガイドポスト70との固定を解除するようになっている。

[0156]

本実施形態では、回転カム部材301のくさび効果を利用することによってガイドポスト70との線接触圧力を増大させることができ、下パンチユニット7を確実に保持することができる。これにより回転カム部材301とガイドポスト70との加工精度、組立精度にばらつきが生じた場合にも該ばらつきを吸収して十分な接触力を得ることができ、搬送時における下パンチユニット7の位置ずれを防止できる。

[0157]

また上記保持機構を、回転カム部材301とばね302とから構成したので、 簡単な構造でしかも必要最小限の部品点数でもって下パンチユニット7を確実に 固定保持することができる。

[0158]

なお、上記実施形態では、ばね302により回転カム部材301を押圧固定し

、スライド爪 6 4 により押圧固定を解除するようにしたが、本発明は、図32(a),(b)に示すように、円板状の回転カム303に固定された回転軸304に駆動モータ305を直結し、該駆動モータ305により回転カム303を回転駆動するようにしてもよい。このように場合にも上記実施形態と略同様の効果が得られる。

[0159]

また上記実施形態では、回転カム部材301を回動させてガイドポスト70に 押圧した場合を説明したが、本発明は図33に示すように、直動カム部材306 を直線移動させることによりガイドポスト70に押圧するようにしてもよく、こ のようにしたのが請求項27の発明である。この場合には、ガイドポスト70へ の接触圧力をさらに増大させることができ、下パンチユニット7をより確実に保 持することができる。

[0160]

また、図34は、くさび形状の直動カム部材307を上下方向にスライドさせ てガイドポスト70に押圧した例であり、この場合にもガイドポスト70への接 触圧力をさらに増大させることができる。

[0161]

さらに上記実施形態では、ガイドポスト70により金型支持板29を加圧方向 に移動可能に支持した場合を説明したが、本発明のガイド機構はこれに限られる ものではない。例えば、図35に示すように、金型支持板29をリニアガイド3 10により加圧方向に移動可能に支持し、該金型支持板29を円形の回転カム3 11によりリニアガイド310に押圧固定するように構成することも可能である 。この場合には、リニアガイド310により精度良く金型支持板29を支持する ことができる。

[0162]

また、図36は、金型支持板29をリニアガイド310により加圧方向に移動可能に支持するとともに、該金型支持板29を楕円形の回転カム312によりリニアガイド310に押圧固定した例である。

[0163]

図37は、請求項28,32,33の発明の一実施形態によるユニット保持手段,保持機構を説明するための図であり、図中、図31と同一符号は同一又は相当部分を示す。

[0164]

本実施形態のユニット保持手段は、ガイドポスト70により加圧方向に移動可能に支持された金型支持板29に回転軸300を介して回動可能に支持された回転カム部材301と、上記金型支持板29の外側にガイドポスト70とは独立して配設された四角柱状のブレーキ部材350と、上記回転カム部材301をブレーキ部材350に線接触による摩擦力でもって押圧固定するばね(押圧部材)302とから構成されている。

[0165]

本実施形態では、回転カム部材301のくさび効果を利用することによってブレーキ部材350との線接触圧力を増大させることができ、下パンチュニット7を確実に保持することができ、上述の実施形態と同様の効果が得られる。

[0166]

また本実施形態では、上記ブレーキ部材350をガイドポスト70とは独立した金型支持板29の外側に配設し、該ブレーキ部材350に回転カム部材301を押圧固定したので、ガイドポスト70にばね302の押圧力が作用することはなく、ガイドポスト70の磨耗を防止できる。その結果、ガイドポスト70の寿命及び金型支持板29の支持精度を向上できる。また上記ブレーキ部材350をガイドポスト70とは異なる材質のものにより構成することができ、摩擦係数が大きく、かつコストの低い材料を採用することができる。

[0167]

なお、上記実施形態では、回転カム部材301をばね302により押圧した場合を説明したが、本発明は、図38に示すように、円板状の回転カム351の回転軸352に駆動モータ353を連結し、該駆動モータ353により回転カム351を回転駆動することによりブレーキ部材350に押圧固定するようにしてもよい。この場合にも上記実施形態と略同様の効果が得られる。

[0168]

上記実施形態では、回転カム部材301を回動させてブレーキ部材350に押圧固定した場合を説明したが、本発明は、図39に示すように、直動カム部材355を直線往復移動させることにより円柱状のブレーキ部材356に押圧固定してもよく、このようにしたのが請求項34の発明である。この場合には、ブレーキ部材356への接触圧力をさらに増大させることができ、下パンチュニット7をより確実に保持できる。

[0169]

また、図40に示すように、金型支持板29とブレーキ部材358との間にく さび形状の直動カム部材357を配設し、該直動カム部材357を上下方向にス ライドさせることにより金型支持板29をブレーキ部材358に押圧固定しても よい。この場合にもブレーキ部材358への接触圧力を増大させることができる

[0170]

さらに、上記実施形態では、金型支持板29をガイドポスト70により加圧方向に移動可能に支持した場合を説明したが、本発明は、図41に示すように、金型支持板29をリニアガイド360により加圧方向に移動可能に支持し、該金型支持板29を円形の回転カム361によりブレーキ部材362に押圧固定することも可能である。この場合には、金型支持板29を精度良く支持することができる。

[0171]

また図42は、金型支持板29をリニアガイド360により移動可能に支持するとともに、楕円形の回転カム363により金型支持板29をブレーキ部材362に押圧固定した例であり、上記実施形態と同様の効果が得られる。

[0172]

本実施形態の粉末注入機構100によれば、粉末原料105が貯留された粉末 貯蔵部101の底壁101aに粉末注入孔101bを形成し、該粉末注入孔10 1bを開閉する擦切り刃103を配置し、該擦切り刃103の先端刃103aで ダイス5からの余分な粉末原料105を擦り切ることにより粉末貯蔵部101に 戻したので、ダイス5の周辺に粉末原料105を飛散させることなく、所定量の 粉末をダイス5内に充填することができる。

[0173]

また上記擦切り刃103により余分な粉末原料105を擦り切るようにので、 擦切り面の平面度を高めることができ、粉末の供給量, 充填密度を均一にすることができる。

[0174]

上記擦切り刃1030をセラミックにより形成したので、繰り返しの擦り切り 操作によって先端刃103aが磨耗するのを抑制でき、寿命を向上できる。

[0175]

本実施形態では、粉末供給管102を粉末注入孔101bに臨む位置から側方にオフセットさせたので、粉末供給管102から供給された粉末原料が粉末注入孔101bから直接注入されるのを防止できる。

[0176]

また上記粉末供給管102を粉末貯蔵部101の天壁101cを貫通させて内部まで挿入したので、粉末貯蔵部102内に粉末原料105を供給する際に空間を残すことができ、ホッパ内の粉体残量の変化による粉末貯蔵部101での粉末密度の変化を抑制でき、ダイス5への粉末充填密度のばらつきを防止できる。

[0177]

本実施形態では、上記粉末注入孔101bの縁部に先端刃103aが係合するテーパ部109を形成したので、先端刃103aがテーパ部109に乗り上げることにより注入孔101bを確実に閉塞することができ、粉末原料105の落ちこぼれを防止できる。

[0178]

また本実施形態では、上記粉末貯蔵部101の側壁101dにスリット108 を形成し、該スリット108を介して外側のアクチュエータ107により擦切り 刃103を開閉駆動するようにしたので、粉末貯蔵部101の粉末貯蔵容積を増 やすことができる。

[0179]

本実施形態によれば、上第1ボールねじ12,12により上下動可能に支持さ

れた駆動ベース10に上第1支柱18,18を介して上第1パンチ6aを固定し、この駆動ベース10に残りの上第2ボールねじ21及び下第1,第2ボールねじ25,30を搭載するとともに、該各ボールねじ21,25,30により上第2パンチ6b及び下第1,第2パンチ7a,7bをそれぞれ独立駆動したので、加圧成形時には上述のように各ボールねじ12,21,25,30を介して上第1,第2パンチ6a,6b及び下第1,第2パンチ7a,7bによりセラミックス粉末原料を圧縮成形でき、均一な圧縮密度を有する成形体を形成することができる。

[0180]

また、脱型時には、上第2ボールねじ21及び下第1,第2ボールねじ25,30を固定した状態で上第1ボールねじ12を介して駆動ベース10を上昇させることにより、上第1,第2パンチ6a,6b及び下第1,第2パンチ7a,7bが同時に上昇し、パンチ間距離を保持した状態でダイス5から成形体の脱型を行なうことができる。これにより粉末を供給したり成形体を取り出したりする装置の構造を簡略化でき、それだけコスト上昇を抑制できる。

[0181]

本実施形態では、各ボールねじ12,21,25,30を駆動ベース10に集中配置するとともに、各サーボモータ53,39,47,50を駆動ベース10,000で、不可能では、各サーボモータ53,39,47,50を駆動ベース10に基準面を設けることにより各ボールねじ12,21,25,30及び各サーボモータ53,39,47,50の組み付け精度を高めることができ、組み付け作業及びメンテナンス作業を容易に行なうことができる。また搬送テーブル8の下方の駆動ベース10に加圧駆動系を集中配置したので、装置全体の高さ寸法を小さくすることができ、小型化に貢献できる。

[0182]

図24ないし図30は、本発明の第2実施形態による粉末成形装置を説明する ための図であり、図中、図1,図4~図7と同一符号は同一又は相当部分を示す 。本実施形態の粉末成形装置200は、粉末成形空間を有するダイス5と上,下 パンチユニット6,7とからなる金型2と、該金型2を粉末供給ステージA,加 圧成形ステージB,機械加工ステージC,成形体取り出しステージDの間で搬送する円板状の搬送テーブル(ダイセット)8と、上記上,下パンチユニットを独立駆動してセラミック粉末原料の加圧成形を行なう加圧駆動機構201とを備えており、基本的な構造は第1実施形態と略同様である。

[0183]

上記上パンチユニット6は上第1パンチ6aに上第2,第3パンチ6b,6c をそれぞれ互いに相対移動可能に挿入してなるものであり、また上記下パンチユニット7は上記同様に下第1パンチ7aに下第2,第3パンチ7b,7cを互いに相対移動可能に挿入してなるものである。上記上パンチユニット6は加圧成形ステージBの上方に配設されており、上記下パンチユニット7は搬送テーブル8の各ダイス5に後述する連結支持手段を介して連結されている。

[0184]

上記加圧駆動機構203は、上第1,第2,第3駆動軸210,211,213を不図示のボールねじを介してサーボモータによりそれぞれ独立して昇降駆動する上駆動部203aと、下第1,第2,第3駆動軸213,214,215を同じく不図示のボールねじを介してサーボモータによりそれぞれ独立して昇降駆動する下駆動部201bとからなり、この上、下駆動部201a,201bは共通の駆動ベース(不図示)に配置されている。

[0185]

上記各上第1,第2,第3駆動軸210,211,212の上端間にはそれぞれ円板状の上第1,第2,第3加圧ラム218,219,220が接続されており、また各下第1,第2,第3駆動軸213,214,215の上端間にはそれぞれ円板状の下第1,第2,第3加圧ラム221,222,223が接続されている。この各加圧ラム218~223には後述する締結手段を介して上記上第1~第3パンチ6a~6c及び下第1~第3パンチ7a~7cが締結されている。このようにして上記サーボモータによりボールねじを介して上第1~第3パンチ6a~6c及び下第1~第3パンチ7a~7cをそれぞれ独立させて駆動することにより、例えば円筒状、円柱状、縦断面H形状、あるいは縦断面十字形状の成形体の加工が行えるようになっている。

[0186]

上記上第1, 第2, 第3パンチ6a, 6b, 6cにはそれぞれ上第1, 第2, 第3パンチホルダ225, 226, 227が接続されており、下第1, 第2, 第3パンチ7a, 7b, 7cにはそれぞれ下第1, 第2, 第3パンチホルダ228, 229, 230が接続されている。

[0187]

上記各上、下パンチホルダ225~227,228~230同士は連結支持手段により互いに相対移動可能に連結されている。この連結支持手段は上、下とも同様の構造であるので、下パンチュニット7の連結支持手段についてのみ説明する。

[0188]

下第1パンチホルダ228は、図24に示すように、ダイス5内に摺動自在に 挿入された円柱状の上ホルダ部228aに、下方に延びる円筒状の下ホルダ部2 28bを一体形成してなり、上記上ホルダ部228aの外壁には軸心方向(加圧 方向)に延びる複数の凹溝228cが周方向に所定間隔をあけて形成されている

[0189]

また上記ダイス5の下端部には係合ピン232,232が挿入固定されており、各係合ピン232は上記凹溝228cに摺動可能に係合している。この凹溝228cの上下長さは加圧トロークより若干長めに設定されており、また溝幅は上記係合ピン232の直径より僅かに大きく形成されている(図27の矢印A視参照)。これにより下第1パンチホルダ228はダイス5により回転,脱落不能にかつ昇降自在に支持されている。

[0190]

下第2パンチホルダ229は、上記下第1パンチホルダ228の下ホルダ部228b内に摺動自在に挿入された円柱状の上ホルダ部229aに、下方に延びる円筒状の下ホルダ部229bを一体形成してなり、上ホルダ部229aの外壁には軸心方向に延びる複数の凹溝229cが周方向に所定間隔をあけて形成されている。この各凹溝228cには上記第1パンチホルダ228の下ホルダ部228

bに挿入固定された係合ピン233が摺動可能に係合しており、この係合ピン233の一部は下ホルダ部228bから直径方向外方に突出している。

[0191]

また、上記第3パンチホルダ230は、上記下第2パンチホルダ229の下ホルダ部229bに摺動自在に挿入された円柱状のホルダ本体230aに軸方向に延びる複数の凹溝230cを周方向に所定間隔をあけて形成してなり、この各凹溝230cには上記第2パンチホルダ229の下ホルダ部229bに挿入固定された係合ピン234が摺動可能に係合しており、基本的な構造は上記と略同様である。また上記ホルダ本体230aの下部には係合ピン235が両端部を直径方向外方に突出させて挿入固定されている。

[0192]

上記ダイス5には固定手段としての固定ブッシュ237が装着されている。この固定ブッシュ237は上記ダイス5が挿入された円筒体237aの上縁部に固定フランジ237bを一体形成してなるものであり、この固定フランジ237bは上記ダイス5とともに搬送テーブル8に2本のボルト238により締結固定されている。

[0193]

上記各上,下パンチホルダ225~227,228~230は締結手段により上記上,下第1~第3加圧ラム218~220,221~223に着脱可能に締結されている。この締結手段は上,下とも同様の構造であるので、下第3加圧ラム223の締結手段についてのみ説明する。

[0194]

上記下第3加圧ラム223の上面には円形状の爪部材239が形成されている。この爪部材239は、縦壁239aと該縦壁239aの上端から内側に屈曲する上壁239bとからなる縦断面鉤状のものであり、上壁239bには直径方向に対向するように切欠き部239cが形成されている。上記爪部材239の内径は上記下第3パンチホルダ230が挿入可能な大きさに設定されており、上記上壁239bは切欠き部239cから周方向に行くほど高さが小さくなるように設定されている。

[0195]

そして下第3パンチホルダ230を爪部材239内に挿入するととも係合ピン235を上記切欠き部239cから爪部材239内に差し込み、この状態でパンチホルダ230を回転させる。すると係合ピン235が上壁239b内面に摩擦力でもって締結固定される。

[0196]

次に本実施形態の作用効果について説明する。

[0197]

搬送テーブル8に下パンチユニット7を取付けるには、まず、予めダイス5に第1~第3パンチ7a~7cを連結してユニット化しておく。そして、上記ダイス5を固定ブッシュ237の円筒体237a内に挿入し、固定ブッシュ237を搬送テーブル8の装着孔8aに挿入する。この状態で、上述のように下第1~第3パンチホルダ228,229,230を下第1加圧ラム221,222,223に一括して締結する。この場合、各パンチホルダ228~230は、各凹溝228~230cに係合する係合ピン232~234により相互に回転不能となっていることから、各パンチホルダ228~230を一括して同時に加圧ラム221~223に締結することが可能である。次に、各ボルト238によりダイス5を固定ブッシュ237とともに搬送テーブル8に締め付けて固定する。また、上第1~第3パンチホルダ225~227を上第1~第3加圧ラム218~220に上記同様の手順にて一括して締結する。

[0198]

上記金型2を交換する場合には、各ボルト238を緩めて外し、下第1~第3パンチホルダ228~230を回転させて下第1~第3加圧ラム221~223から一括して外し、この状態で固定ブッシュ237を搬送テーブル8から抜き取る。これによりダイス5,下パンチユニット7も同時に外れることとなる。また上記上パンチユニット6についても上記同様に上第1~第3パンチホルダ225~227を上第1~第3加圧ラム218~220から一括して外す。

[0199]

このように本実施形態によれば、ダイス5に下第1~第3パンチホルダ228

~230を互いに相対移動可能にかつ脱落,回転不能に連結し、上記ダイス5を固定ブッシュ237に挿入し、該固定ブッシュ237をダイス5とともに搬送テーブル8にボルト締め固定したので、金型の交換を行なう場合には、各ボルト238を取り外し、下第1~第3パンチホルダ228~230を下第1~第3加圧ラム221~223から外すだけで、ダイス5及び下パンチユニット7を搬送テーブル8から抜き取ることができる。また新たな金型を組み付けるには、固定ブッシュ237を搬送テーブル8の装着孔8aに挿入し、下第1~第3パンチホルダ228~230を各加圧ラム221~223に締結した後、ダイス5をボルト締め固定するという、簡単な作業で済み、金型の交換を短時間でかつ容易に行なうことができ、作業性を向上できる。これにより多品種少量生産を行なう場合の金型交換を略ワンタッチで行なうことができ、生産効率を向上できる。

[0200]

本実施形態では、各下第1~第3パンチホルダ228~230に凹溝228c~230cを形成し、各凹溝228c~230cにそれぞれダイス5、第1,第2パンチホルダ228,229の係合ピン232~234を係合させたので、第1~第3パンチホルダ228~230同士を簡単な構造で回転不能にかつ脱落不能に連結できる。また上パンチユニット6についても上記下パンチユニット7と同様の構造により連結したので、この場合にも簡単な構造で回転,脱落不能に連結できる。

[0201]

本実施形態によれば、上第1~第3加圧ラム218~220及び下第1~第3加圧ラム221~223にそれぞれ爪部材239を形成し、該各爪部材239に上第1~第3パンチホルダ225~227及び下第1~第3パンチホルダ228~230の各係合ピン233~235を係合させることにより締結したので、各パンチホルダ225~227及び228~230を各駆動軸210~212及び213~215に一括して着脱することができ、金型の交換を短時間でかつ容易に行なうことができ、上記同様の効果が得られる。

[0202]

また縦壁239aと上壁239bとからなる鉤状の爪部材239に各パンチホ

ルダの係合ピン233~235を挿入して回転させることにより締結するように したので、簡単な構造で着脱作業を容易に行なうことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

請求項1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 2 1, 22, 25の発明の第1実施形態による粉末成形装置を説明するための概略 構成図である。

【図2】

上記粉末成形装置の斜視図である。

【図3】

上記粉末成形装置の搬送テーブルの動作を示す平面図である。

【図4】

上記粉末成形装置の粉末注入機構の動作を示す図である。

【図5】

上記粉末成形装置の金型の成形位置決め手段の断面図である。

【図6】

上記成形位置決め手段の断面図である。

【図7】

上記粉末成形装置のテーパブロックの昇降駆動機構を示す断面図である。

【図8】

上記粉末成形装置の連結手段の分解斜視図である。

【図9】

上記連結手段の斜視図である。

【図10】

上記連結手段の断面図である。

【図11】

上記粉末成形装置のユニット保持手段の断面図である。

【図12】

上記ユニット保持手段の平面図である。

【図13】

上記粉末成形装置の下パンチユニット(成形体保持手段)による成形体の保持 状態を示す図である。

【図14】

上記下パンチユニットによる成形体の保持状態を示す図である。

【図15】

上記下パンチユニットによる成形体の保持状態を示す図である。

【図16】

請求項3,4,5,6の発明の一実施形態による成形体保持手段を示す図である。

【図17】

上記成形体保持手段の他の実施形態を示す図である。

【図18】

請求項10の発明の一実施形態によるパンチ位置決め手段を示す図である。

【図19】

請求項17の発明の一実施形態による連結手段を示す図である。

【図20】

上記スライド爪の変形例を示す図である。

【図21】

請求項19の発明の一実施形態による連結手段を示す図である。

【図22】

請求項23の発明の一実施形態によるユニット保持手段を示す図である。

【図23】

請求項24の発明の一実施形態によるユニット保持手段を示す図である。

【図24】

本発明の第2実施形態による粉末成形装置の下パンチユニットの連結固定状態 を示す断面図である。

【図25】

上記下パンチユニットの斜視図である。

【図26】

上記下パンチユニットの加圧ラムの平面図である。

【図27】

上記下パンチユニットの締結状態を示す図である。

【図28】

上記上記下パンチユニットの締結状態を示す図である。

【図29】

上記粉末成形装置の動作を示す概略図である。

【図30】

上記粉末成形装置の搬送テーブルの動作を示す図である。

【図31】

請求項25,26の発明の一実施形態による保持機構を示す平面図である。

【図32】

上記保持機構の他の実施形態による押圧部材を示す図である。

【図33】

請求項27の発明の一実施形態による直動力ム部材を示す図である。

【図34】

上記実施形態の他の実施形態による直動カムを示す図である。

【図35】

上記実施形態のガイド機構の他の実施形態によるリニアガイドを示す図である

【図36】

上記ガイド機構の他の実施形態によるリニアガイドを示す図である。

【図37】

請求項28,32,33の発明の一実施形態によるユニット保持手段・保持機構を示す図である。

【図38】

上記保持機構の他の実施形態を示す図である。

【図39】

請求項34の発明の一実施形態による保持機構の直動カム部材を示す図である

【図40】

上記実施形態の他の実施形態による直動カム部材を示す図である。

【図41】

上記実施形態のガイド機構の他の実施形態によるリニアガイドを示す図である

【図42】

上記ガイド機構の他の実施形態によるリニアガイドを示す図である。

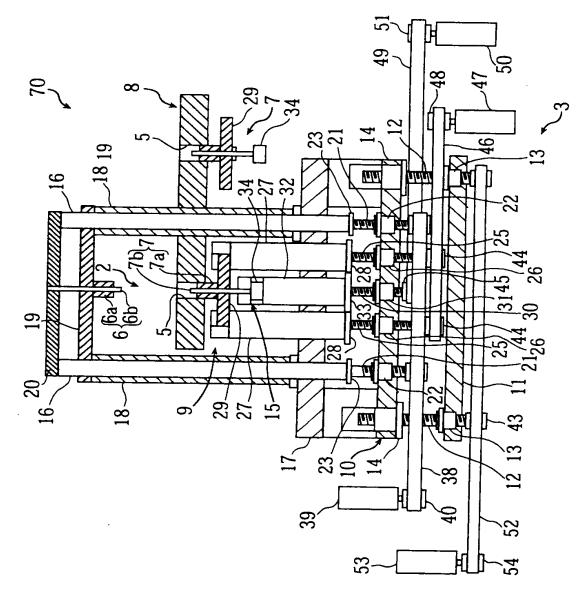
【符号の説明】

1	粉末成形装置
2	金型
3	加圧駆動機構
4	ユニット保持手段
5	ダイス
5 a	テーパ部(パンチ位置決め手段)
6	上パンチユニット
6 a, 6 b	上第1, 第2パンチ
7	下パンチユニット
7 a, 7 b	下第1, 第2パンチ
8	搬送テーブル(金型搬送機構)
9	連結手段
6 0	テーパブロック(パンチ位置決め手段)
60 Ъ	減圧通路(減圧手段)
6 3	クランプ本体
6 4	スライド爪
6 4 a	テーパ部
6 5	エアシリンダ機構(スライド駆動機構)
7 0	ガイドポスト

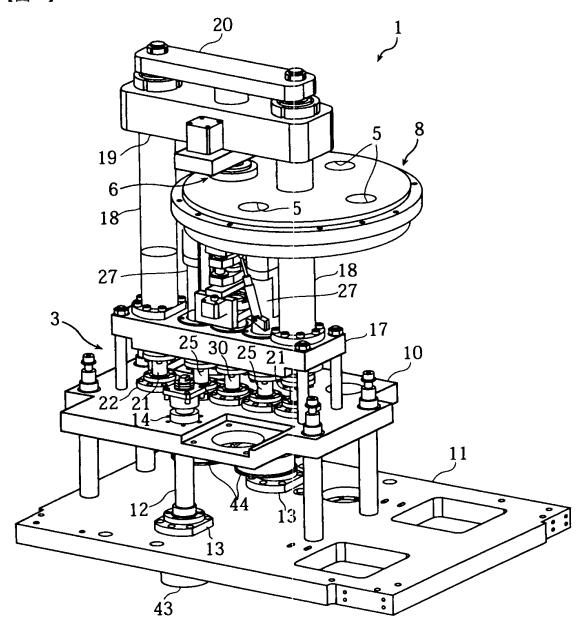
7 2	回転軸
7 3	締結レバー
7 4	ばね
8 0	係合片
8 1	ガイド部材
82,83	押圧部材(押圧機構)
8 4	吸引通路(流体圧力発生機構)
8 5	加圧通気供給部材(流体圧力発生機構)
8 8	ガイドピン(パンチ位置決め手段)
8 8 a	尖部
8 9	位置決め孔(パンチ位置決め手段)
90,91	スライド爪
9 5	永久磁石
9 6	電磁石
1 0 0	粉末注入機構
1 0 1	粉末貯蔵部
1 0 2	粉末供給管
1 0 3	擦切り刃
1 0 8	テーパ部
1 0 9	テーパ部
1 A ~ 1 E	成形体
A	粉末供給ステージ
В	加圧成形ステージ
C	機械加工ステージ
D	成形体取り出しステージ

【書類名】 図面

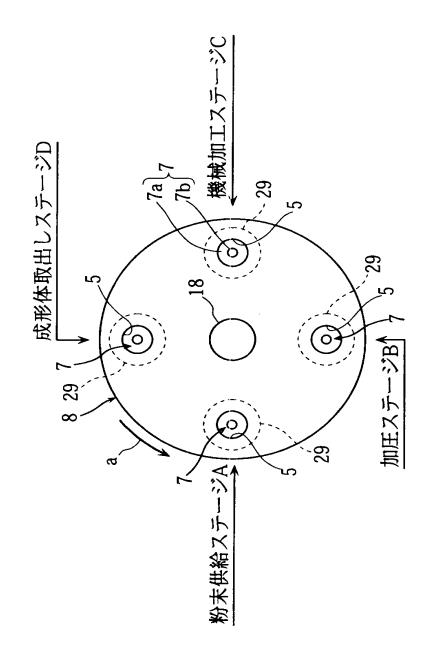
【図1】



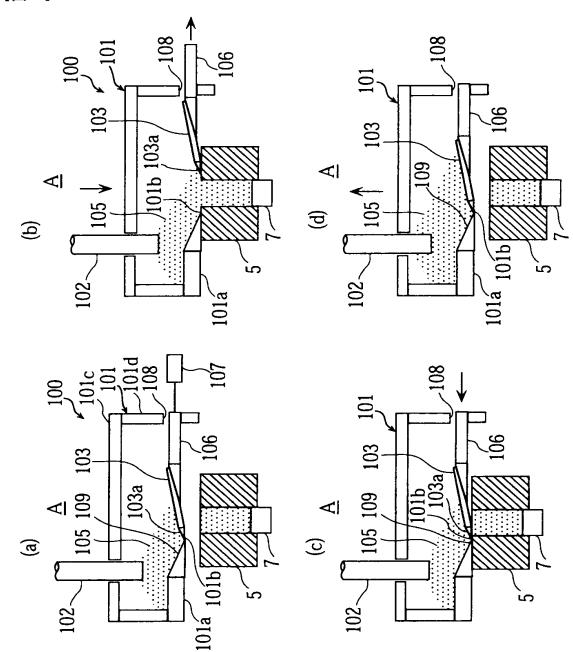
【図2】



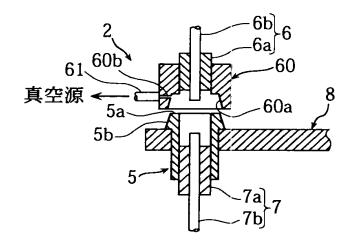
【図3】



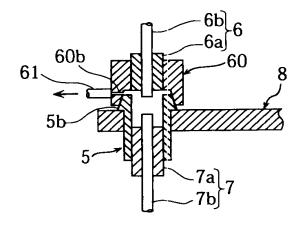
【図4】



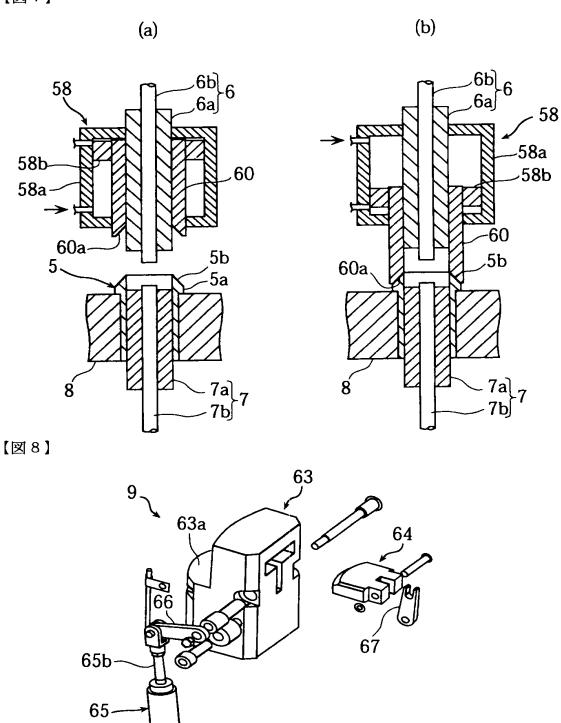
【図5】



【図6】

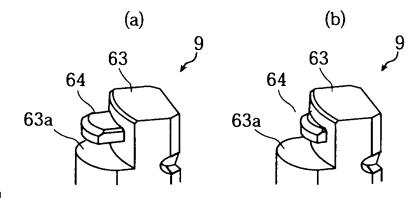


【図7】

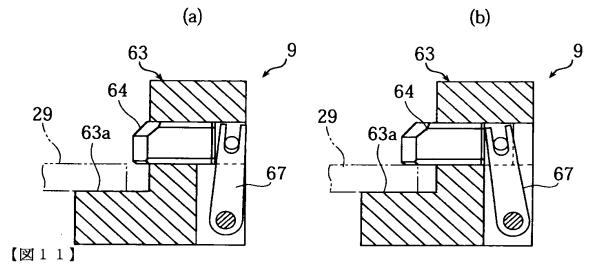


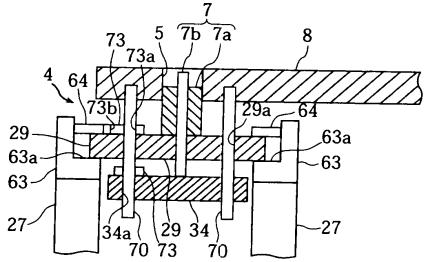
65a



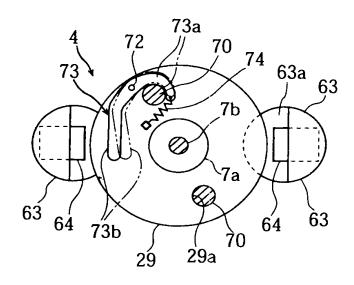


【図10】

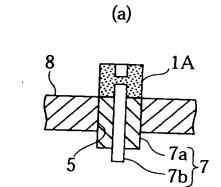




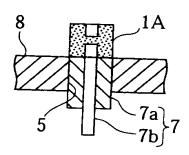
【図12】



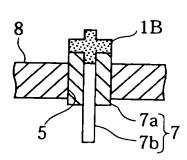
【図13】



(b)

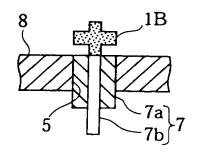


【図14】



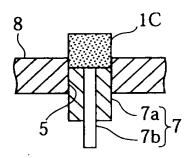
(a)

(b)

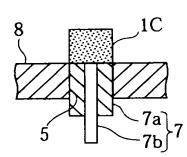


【図15】

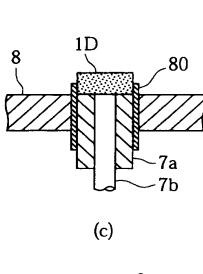




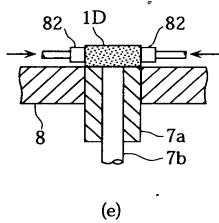
(b)

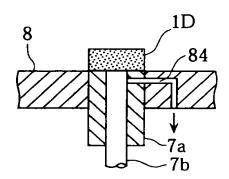


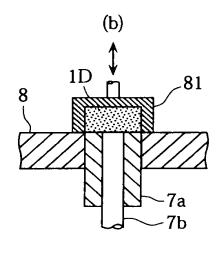
【図16】

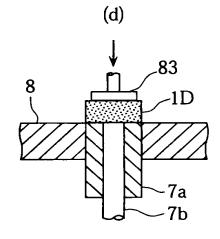


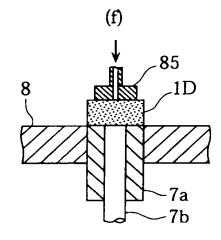
(a)



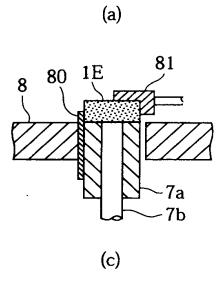


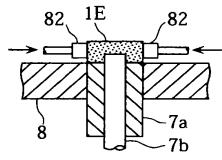


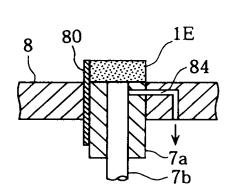




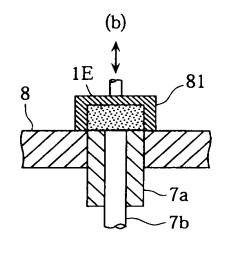
【図17】

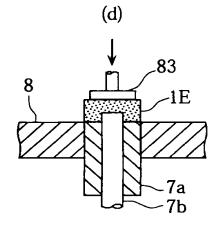


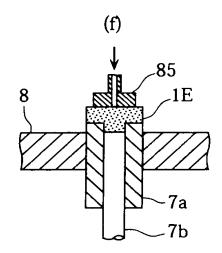




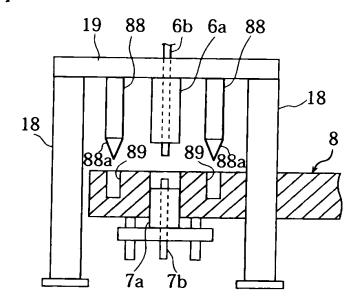
(e)



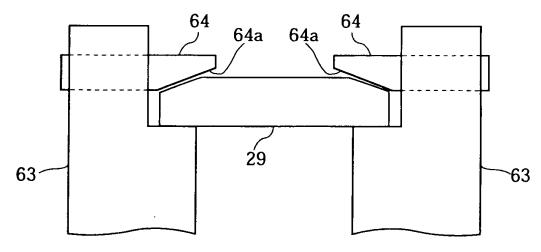




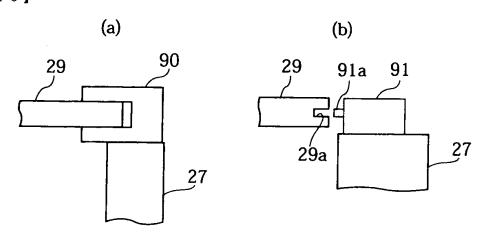
【図18】



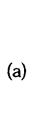
【図19】

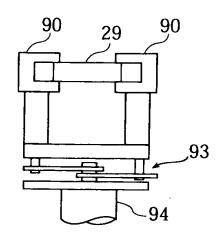


【図20】

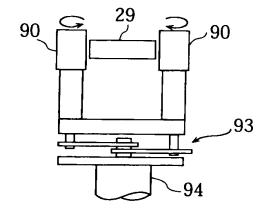


【図21】

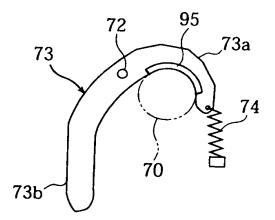




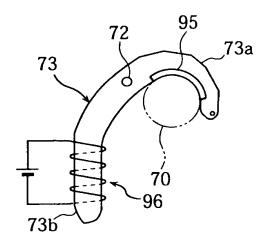




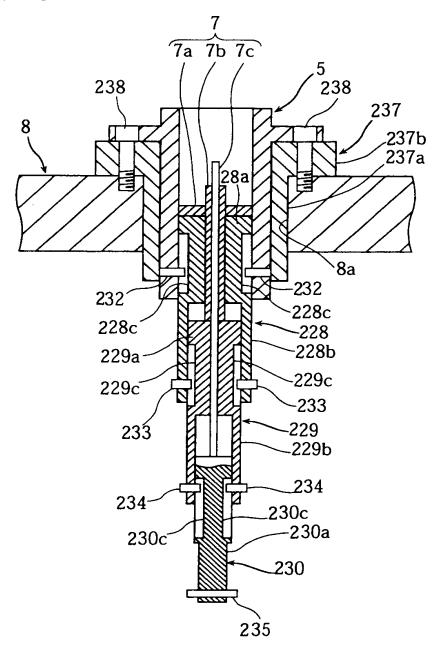
【図22】



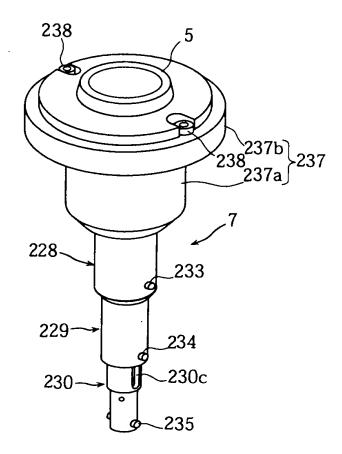
【図23】



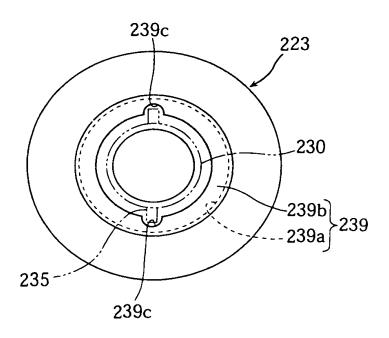
【図24】



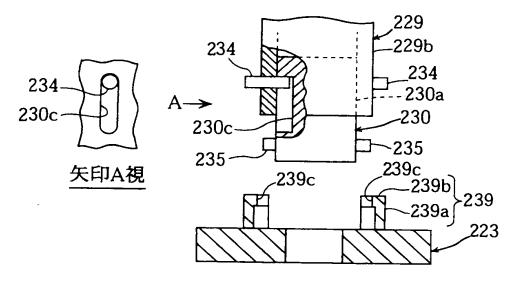
【図25】



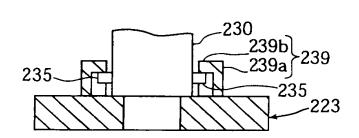
【図26】



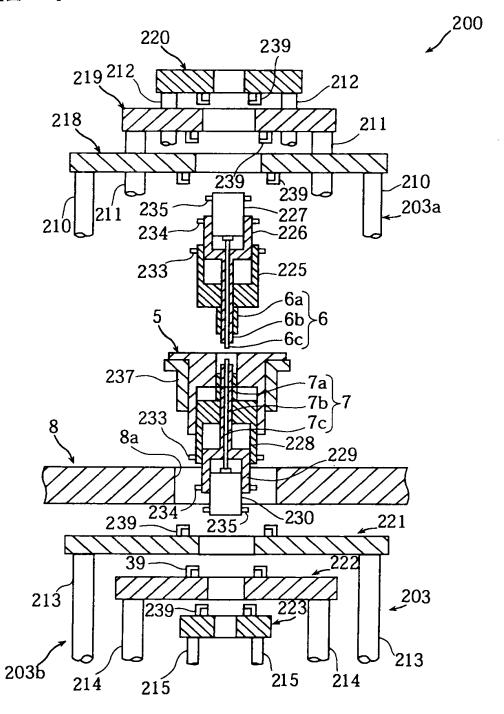
【図27】



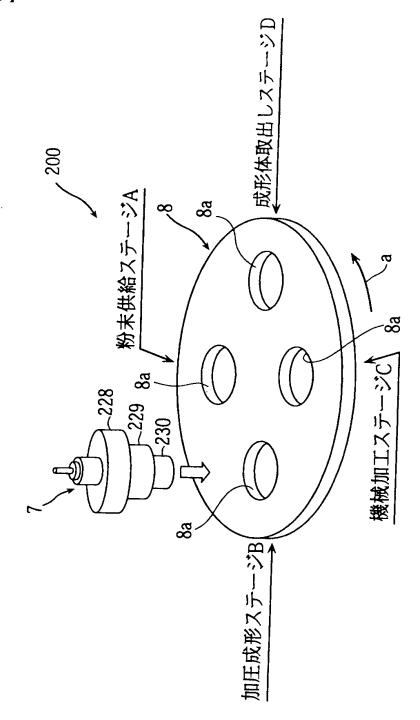
【図28】



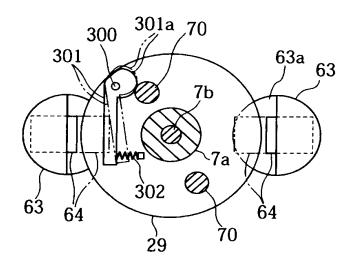
【図29】



【図30】

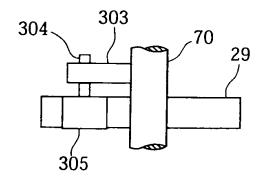


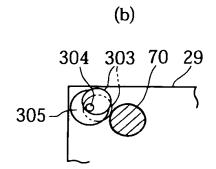
【図31】



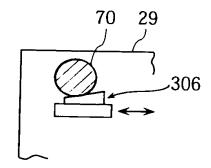
【図32】



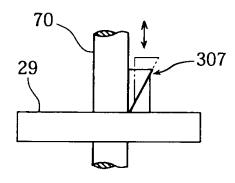




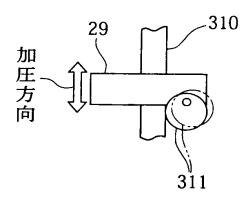
【図33】



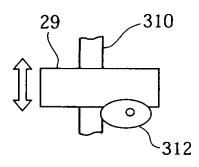
【図34】



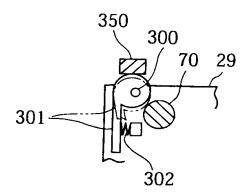
【図35】



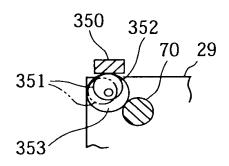
【図36】



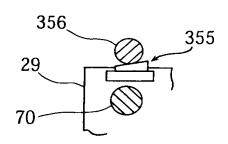
【図37】



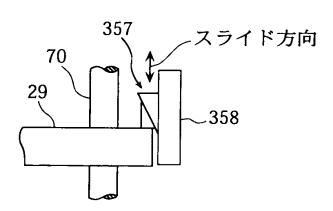
【図38】



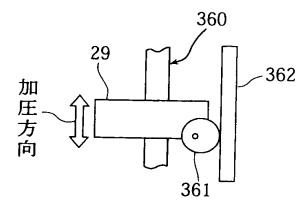
【図39】



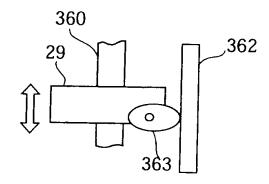
【図40】



【図41】



【図42】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 成形体を各ステージ間を搬送する際に該成形体が倒れたり、位置ずれ したりするのを防止して搬送速度の高速化に対応できる粉末成形装置を提供する

【解決手段】 粉末成形空間を有するダイス5と上,下パンチユニット6,7とからなる金型2と、上記上,下パンチユニット6,7をそれぞれ独立して駆動することにより加圧成形を行なう加圧駆動機構3とを備えた粉末成形装置において、上記加圧成形された成形体1Aを搬送する際に該成形体1Aに下第1,第2パンチ7a,7b(成形体保持手段)を係合させることにより保持する。

【選択図】 図12

出願人履歴情報

識別番号

[000006231]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

氏 名

株式会社村田製作所